ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ»

543.42 + 541.1(07)

А.А. Пупышев, Д.А. Данилова

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ

Учебное пособие

Екатеринбург 2005 УДК 543.42 + 541.1(07) ББК 22.344 П 88

Рецензенты: докт. техн. наук Ю.Б. Атнашев, кафедра аналитической химии Уральского государственного университета им. А.М. Горького

Авторы: А.А. Пупышев, Д.А. Данилова

П 88 Термодинамическое моделирование для метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой: Учебное пособие / А.А. Пупышев, Д.А. Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 76 с.

Учебное пособие знакомит с новыми возможностями метода термодинамического моделирования в приложении к описанию термохимических процессов в плазме индуктивно связанного разряда и прогнозированию оптимальных условий аналитических определений атомно-эмиссионной спектрометрией с использованием данного источника возбуждения спектров.

Кратко изложены основные принципы методов термодинамического моделирования и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, приведены необходимые для моделирования физические характеристики разряда, основные допущения и ограничения разработанной термодинамической модели. Изложены алгоритмы решения различных аналитических задач с приведением конкретных примеров решений. Приведена обширная справочная информация, необходимая для проведения данных расчетов: комплекты термодинамических свойств атомов и атомных ионов, а также их суммы по энергетическим состояниям.

Пособие предназначено для студентов, бакалавров, дипломированных специалистов, магистров, аспирантов и преподавателей химических и физических специальностей высших учебных заведений России, а также инженерно-технических и научных работников лабораторий спектрального анализа.

Библиогр.: 27 назв. Рис. 9. Табл. 8. Прил. 2.

УДК 543.42 + 541.1(07)

ББК 22.344

ВВЕДЕНИЕ

Методы атомной спектрометрии, использующие высокотемпературные источники испарения компонентов конденсированных проб, атомизации элементов, ионизации атомов, возбуждения и регистрации спектров атомов и ионов, являются сейчас одними из самых распространенных методов анализа, с помощью большая выполняется часть элементных определений. Метрологические и информационные характеристики данных методов в определяются термохимическими очередь процессами. протекающими в этих высокотемпературных спектральных источниках с непосредственным участием анализируемых многокомпонентных образцов.

Для объяснения наблюдаемых явлений, прогнозирования условий оптимальных методических анализа, улучшения характеристик метрологических методик атомного спектрального решения разнообразных актуальных перспективных И аналитических задач, а также эффективного обучения аналитиков систематизированные необходимы данные 0 термохимическом поведении широкого определяемых элементов круга разнообразнейших объектах анализа и спектральных источниках, что, в осуществимо очень трудно из-за огромного принципе, информации. Но указанные проблемные вопросы можно разрешить и с помощью расчетно-теоретических моделей, учитывающих множество экспериментальных факторов и позволяющих получить практические аналитические результаты.

По нашему мнению, использование для целей моделирования современных теоретических методов исследований, основанных на равновесной термодинамики, применении накопленных обширных термодинамических СВОЙСТВ индивидуальных программных комплексов для расчета полного равновесного состава многокомпонентных гетерогенных систем и мощных современных электронно-вычислительных машин может позволить во многих случаях максимально быстро получить необходимую ДЛЯ информацию, резко сократить время методических разработок, объем и стоимость экспериментов. Возможность наглядного и количественного прослеживания влияния различных операционных параметров анализируемых проб результаты на аналитических определений существенно облегчает подготовку инженеров-аналитиков.

В данной работе впервые обобщены практические рекомендации по проведению термодинамического моделирования в приложении к методу атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И АППАРАТУРА МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ

Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой сейчас является одним из самых эффективных методов количественного многоэлементного химического анализа.

На рис. 1.1 приведена принципиальная блок-схема спектрометра с индуктивно связанной плазмой. Его основными узлами являются:

- нагруженный на индуктор высокочастотный генератор с системой автоматической регулировки мощности и блоком согласования с плазмой;
- плазменная горелка с системой регулировки газовых потоков и устройством ввода пробы (распылитель растворов, генератор гидридов, электротермический испаритель, искровой разряд или лазерный аблятор);
- спектральный прибор (многоканальный спектрометр и/или сканирующий монохроматор);
- фотоприемники и электронные блоки для усиления и интегрирования сигналов:
- электронно-вычислительная машина (ЭВМ) с внешними устройствами для управления спектрометром и обработки информации.

Разряд индуктивно связанной плазмы создается и поддерживается в специальной горелке (рис. 1.1), представляющей собой сборку из трех концентрически расположенных кварцевых трубок. В зазор между внешней и промежуточной трубками тангенциально вводят внешний (плазмообразующий, охлаждающий) поток газа, обычно аргона ($10 \div 20$ л/мин), но иногда может применяться молекулярный газ. В зазор между промежуточной и центральной трубками также тангенциально подают промежуточный (аксиальный) поток аргона (от 0 до 2 л/мин).

По центральной трубке (она может быть выполнена и из корунда) вводят транспортирующий (пробоподающий) поток газа (0,6 ÷ 1,5 л/мин), который переносит аэрозоль раствора пробы или газообразную пробу в плазму разряда. Горелка помещена внутри индукционной катушки (индуктор), соединенной с генератором высокой частоты (27 или 40 МГц). Индуктор охлаждается водой или аргоном.

Ток высокой частоты, протекающий через индуктор, создает переменное электромагнитное поле. Напряженность электрического поля направлена вдоль витков индуктора, то есть концентрически с индуктором, а магнитного поля – вдоль оси индуктора. Для возбуждения разряда необходима предварительная ионизация газа. Первичные электроны создаются в горелке с помощью вспомогательного

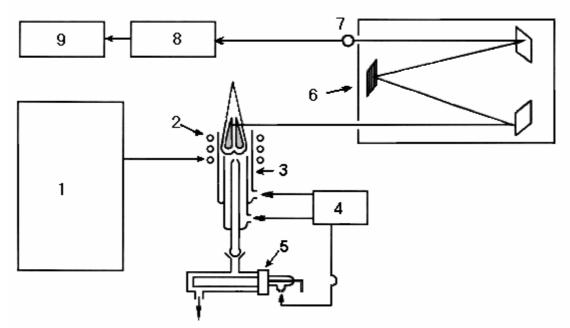


Рис. 1.1. Блок-схема атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой. Система электропитания плазмы: 1 – высокочастотный генератор, 2 - катушка индуктора. Система создания и поддержания плазмы: 3 – горелка, 4 - блок регулирования стабилизации газовых потоков, 5 – устройство ввода регистрации сигналов: Система (пневматический распылитель). 6 – спектрометр, 7 - фотоприемник. Системы усиления и обработки сигналов и управления прибора: 8 - считывающая электроника, 9 - 3BM.

электрического высоковольтной искры маломощного разряда (рис. 1.2). Электрическое поле ускоряет первичные электроны, которые под действием магнитного поля двигаются по окружности. Таким образом, электромагнитное поле индуктора заставляет электроны (колебаться) вращаться ПО круговым ускоряться замкнутым внутри кварцевой горелки. Этот траекториям электронный поток называется вихревым ТОКОМ электронов. Силовые его представляют собой замкнутые окружности, концентрические с витками катушки.

Вихревой ток электронов нагревает плазмообразующий газ за счет джоулева тепла, то есть энергии, выделяемой при прохождении электрического тока через проводник. Это повышает температуру газа и приводит к возбуждению его атомов и некоторой их ионизации. Но основной вклад в возбуждение и ионизацию атомов газа вносят прямые столкновения ускоренных электронов с атомами газа. В результате этих процессов при достаточно большой мощности высокочастотного генератора внутри горелки формируется самоподдерживающаяся которая (тороидальная) плазма, кольцевая СИЛЬНЫМ потоком

плазмообразующего газа выдувается из горелки в виде пламенноподобного факела плазмы.

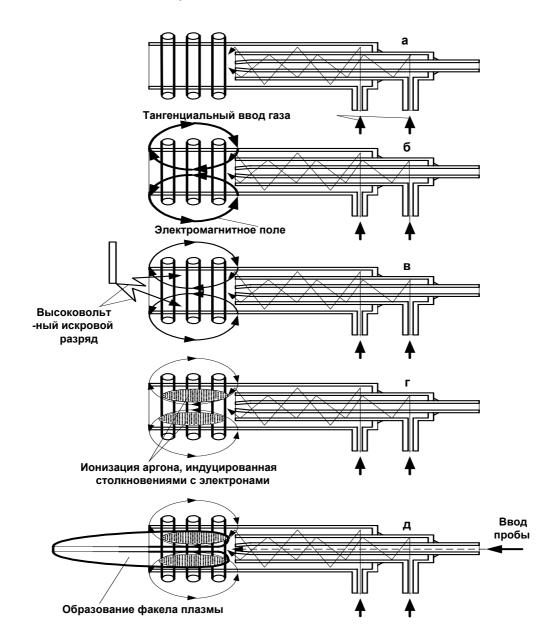


Рис. 1.2. Схематическое изображение горелки и индуктора индуктивно связанной плазмы, показывающее возникновение разряда: а — прохождение тангенциальных потоков аргона в зазорах между кварцевыми трубками горелки; б — подведение мощности от генератора к индуктору, производящее интенсивное высокочастотное электромагнитное поле; в — создание первичных свободных электронов вспомогательной высоковольтной искрой; г — столкновение свободных электронов, ускоренных электрическим полем, с атомами аргона, вызывающее их ионизацию; д — возникновение факела индуктивно связанной плазмы в открытом конце плазменной горелки

Температура электронов в тороидальном плазмоиде внутри горелки достигает 8000 ÷ 10000 К (рис. 1.3) и существенно превышает температуры тяжелых атомных и молекулярных частиц. Таким образом, физические условия в плазмоиде являются неравновесными.

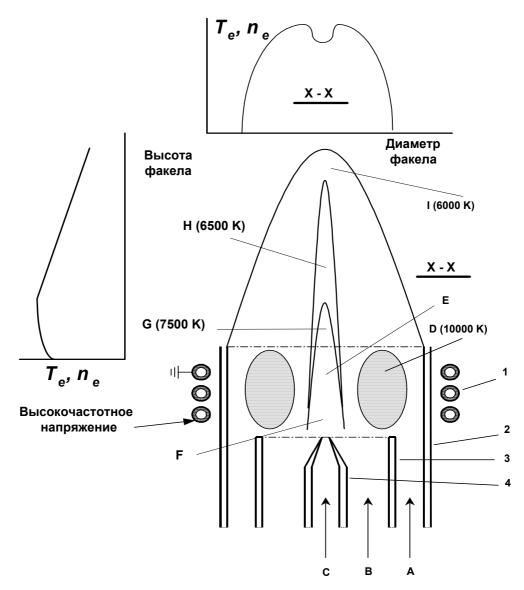


Рис. 1.3. Схематичное изображение горелки индуктивно связанной плазмы (1 — индуктор; 2, 3 — концентрические кварцевые трубки; 4 - инжектор; А — плазмообразующий поток газа; В — вспомогательный поток газа; С — транспортирующий поток газа), характерные участки в плазменном факеле (D — "скин—слой"; Е — центральный канал плазмы; F - участок предварительного нагрева, G — зона начального излучения; Н — нормальная аналитическая зона; I — "хвост" плазмы), средние температуры электронов $T_{\rm e}$ в них (в скобках), общий вид аксиального и радиального распределения температур $T_{\rm e}$ и концентрации электронов $n_{\rm e}$ по высоте и диаметру факела плазмы

Внутренние части факела плазмы прогреваются преимущественно за счет теплопередачи от горячего тороидального плазмоида, а также диффузией и конвекцией частиц. Плазма, выдуваемая газовым потоком из горелки, перестает получать энергию от индуктора и начинает охлаждаться (распадаться).

В результате этих процессов наблюдается достаточно сложное распределение температур по факелу плазмы (рис. 1.3), которое, в принципе, нужно учитывать при моделировании термохимических процессов в плазме. Распределение концентрации электронов по факелу плазмы геометрически подобно распределению температуры (рис. 1.3).

Внешний поток аргона одновременно служит плазмообразующим и охлаждающим газом, так как отжимает горячий плазмоид от внешней трубки горелки, предохраняя ее от разрушения. Промежуточный поток аргона используется для поддержания устойчивости плазмы на заданной высоте над горелкой. Кроме того, он препятствует осаждению солей на кончике центральной трубки, стабилизирует горение факела плазмы при введении в разряд органических растворителей.

Анализируемое вещество обычно в виде аэрозоля раствора подается транспортирующим потоком аргона по центральной трубке (инжектору), пробивает осевую (наименее вязкую) часть плазмоида, и, проходя по образовавшемуся каналу сквозь высокотемпературную зону разряда, быстро нагревается. При этом последовательно осушается частички аэрозоля аэрозоль, сухие испаряются, молекулы диссоциируют до атомов. Образовавшиеся атомы, получая энергию от быстрых электронов в плазме, переходят в возбужденное состояние и частично ионизируются. В свою очередь атомные ионы, сталкиваясь с также возбуждаются. В результате электронами, В индуктивно связанной плазме формируется спектр атомной и ионной эмиссии. термохимических Общая схема процессов, протекающих компонентами пробы в факеле плазмы, представлена на рис. 1.4.

В аксиальном центральном канале обычно выделяют (рис. 1.3) участок предварительного нагрева F (осушение аэрозоля, испарение и атомизация) и три тесно примыкающие друг к другу зоны над индуктором, названные в порядке расположения по ходу развития факела: зона начального (первичного) излучения G (начало возбуждения атомов аналита), нормальная аналитическая зона H (зона эмиссии) и «хвост» («хвостовая часть») плазмы I, в которой велики флуктуации (наименее стабильная зона плазмы).

Эти названия родились еще в период становления атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, как результат наблюдаемого различия окраски этих зон, возникающего при введении в плазму элементов, излучающих яркие линии в видимом диапазоне спектра (например, атомы иттрия дают красное свечение, а его однозарядные атомные ионы – голубое). Без введения индикаторного элемента обычно эти зоны плазмы не различимы, так как их затмевает яркий тороидальный плазменный сгусток.

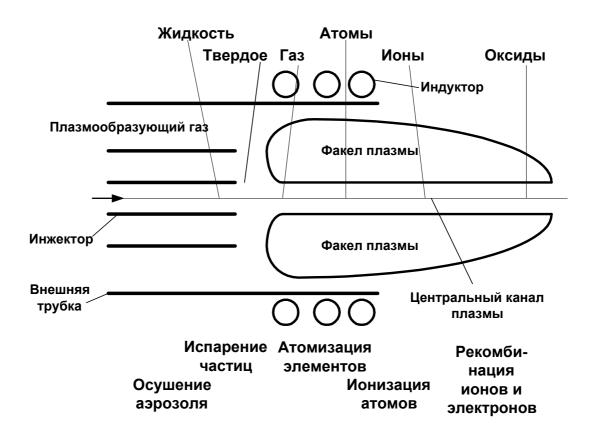


Рис. 1.4. Процессы, протекающие при трансформации аэрозоля во время движения по центральному каналу факела плазмы, и основные частицы, образующиеся при этом

Характерная окраска зон наглядно демонстрирует неодинаковость их физических свойств. Данные зоны существенно отличаются между собой радиальным и аксиальным распределениями температур и плотности электронов (рис. 1.3), концентраций атомов, молекул и ионов, а также другими факторами. Изменяя мощность высокочастотного поля и скорость трех газовых потоков можно в некоторых пределах перемещать аксиальное положение зон. Так как обычно в процессе плазмообразующий работы ПОТОК аргона не изменяют, поток используют вспомогательный не всегда, TO на практике перемещение аксиального положения зон достигают только изменением высокочастотной мощности вкладываемой В разряд скорости транспортирующего потока аргона.

Физические условия, реализуемые в центральном канале факела плазмы, гораздо ближе к равновесным, чем в тороидальном плазмоиде. Это позволяет применять к зоне центрального канала плазмы расчеты, основанные на локальном термодинамическом равновесии.

В современных спектрометрах с индуктивно связанной плазмой радиальный И аксиальный способы излучения. При радиальном способе излучение отбирается под углом 90° к центральному каналу плазмы на высоте 10 ÷ 20 мм над минимальный ЭТОМ случае достигается В матричных помех на результаты определений. Улучшение пределов обнаружения элементов в 5 ÷ 10 раз можно достичь с использованием аксиального способа наблюдения плазмы, т.е. отбора излучения вдоль оси разряда со стороны "хвостовой" части факела. Но при аксиальном наблюдении плазмы в этом методе анализа гораздо проявляются матричные неспектральные помехи.

Температура в зоне радиального наблюдения плазмы, т.е. на определенной высоте факела над горелкой, зависит, в первую очередь, вкладываемой в плазму высокочастотной мощности, скорости транспортирующего потока газа и конструкции горелки. С повышением мощности разряда и снижением потока транспортирующего газа температура на данной высоте наблюдения факела увеличивается, а максимум аксиального распределения температур (рис. приближается к индуктору. Одновременно с вариацией операционных параметров изменяется и распределение концентрации электронов по факелу плазмы. Наиболее подробно распределение температур и концентрации электронов в факеле индуктивно связанной плазмы изучено в работах [1-5].

Как видно из рис. 1.3, хотя температура плазмы очень сильно меняется по диаметру факела, но в его центральном канале, где осуществляются основные процессы трансформации компонентов пробы до атомов и атомных ионов, а затем возбуждение их спектра, степень изменения температуры существенно меньше. Компоненты преимущественно находятся В центральном канале, возбуждение спектров элементов также осуществляется, в основном, здесь. Поэтому, на практике, при радиальном способе наблюдения факела часто используют для оценок аналитических характеристик метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной эффективные температуры, значения т.е. радиально неразрешенные значения температуры.

Показано. общем случае, при моделировании что, наблюдаемой термохимических процессов радиально плазме В достаточно использовать именно значения эффективной температуры наблюдаемой Ho при моделировании аксиально плазмы использование значения эффективной температуры нежелательно, поскольку при аксиальной регистрации сигнала градиент температур вдоль линии наблюдения является значительно более сильным, чем при радиальной регистрации.

Обычно в плазму вводят аэрозоль, образованный водным или органическим раствором пробы. Для получения аэрозоля растворов пневматические преимущественно И ультразвуковые распылители, которые различаются эффективностью аэрозоля. Кроме того, при прямом анализе твердых проб возможен перевод части твердой пробы в газообразную и аэрозольную форму с помощью искрового разряда или лазерного излучения (лазерная абляция). Метод термодинамического моделирования позволяет задать состав пробы, поступающей в плазму разряда, при использовании различных устройств ввода.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДА РАВНОВЕСНОГО ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Для практических аналитических целей многоэлементного атомноэмиссионного спектрального анализа наиболее подходят высокоинформативные модели, позволяющие в расчетах максимально полно задавать операционные параметры и химический состав системы, получать в результате расчетов концентрации различных плазменных частиц и переходить к теоретическому определению аналитического сигнала — интенсивности спектральных линий атомов и атомных ионов. Наиболее успешно пока такие задачи в атомной спектрометрии решаются методом равновесного термодинамического моделирования.

Метод термодинамического моделирования основан на анализе поведения сложной многокомпонентной гетерогенной высокотемпературной системы. Для этого предварительно выполняется расчет полного равновесного состава системы с учетом образования большинства потенциально возможных в равновесии индивидуальных веществ [7, 8]. Способы расчета термодинамического равновесия произвольных систем (определение всех равновесных параметров, термодинамических свойств, химического и фазового состава) основаны на минимизации изобарно-изотермического потенциала или максимизации энтропии системы.

настоящее время существует ряд расчетных программ. позволяющих успешно решать данные задачи. К числу наиболее известных программных комплексов CO СВОИМИ базами "MTDATA" термодинамических [9]: данных ОНЖОМ отнести (Великобритания), "THERDAS" (Германия), "TERMOCALC" (Швеция), "THERMODATA" (Франция), "FAST" (Канада), "MANLABS" (США), "CRIPO" (Австралия), "CTC" (Япония), "HSC Chemistry" (Финляндия) и др.

Наиболее эффективной и удобной программой для изучения термохимических процессов в низкотемпературной плазме, по нашему мнению, является программный комплекс "ACTPA" (Россия), использующий принцип максимизации энтропии термодинамической системы S_{max} [7, 8]:

$$S = \sum_{g=1}^{G} \left[S_{g}^{0}(T) - R_{0} \ln \frac{R_{0} \cdot T}{V} n_{g} \right] \cdot n_{g} + \sum_{c=1}^{C} S_{c}^{0}(T) \cdot n_{c} + \sum_{x=1}^{X} \sum_{r=1}^{R} \left[S_{rx}^{0}(T) - R_{0} \ln w_{rx} \right] \cdot n_{rx} \Rightarrow S_{max}$$

где $n_{\rm g}$, $n_{\rm c}$, $n_{\rm rx}$, $S_{\rm g}^{~0}$, $S_{\rm c}^{~0}$, $S_{\rm rx}^{~0}$ – число молей и стандартная энтропия (при температуре T и давлении 0,1 МПа) в газовой (g), конденсированной (c) фазах и в растворе (rx) (индекс x относится к раствору, а r – к компоненту раствора), соответственно; G, C, X – количество газообразных, конденсированных компонентов и растворов в термодинамической системе, соответственно; $w_{\rm rx}$ – мольная доля компонента в растворе; V – объем; R_0 – универсальная газовая постоянная.

На область допустимых значений переменных при установлении химического и фазового равновесия путем достижения максимума энтропии накладываются следующие дополнительные ограничения.

1. Постоянство полной внутренней энергии системы при равновесии:

$$U = \sum_{g=1}^{G} U_{g}(T) \cdot n_{g} + \sum_{c=1}^{C} U_{c}(T) \cdot n_{c} + \sum_{x=1}^{X} \sum_{r=1}^{R} U_{rx}(T) \cdot n_{rx} = \text{const},$$

где $U_{\rm g}$, $U_{\rm c}$, $U_{\rm rx}$ — мольные внутренние энергии компонентов газовой фазы, конденсированных компонентов и компонентов конденсированных растворов.

2. Сохранение массы всех химических элементов:

$$-b_{j} + \sum_{g=1}^{G} v_{jg} n_{g} + \sum_{c=1}^{C} v_{jc} n_{c} + \sum_{x=1}^{X} \sum_{r=1}^{R} v_{jrx} n_{rx} = 0 ,$$

где $b_{\rm j}$ — мольное содержание j-го химического элемента в системе; $\nu_{\rm jg}$, $\nu_{\rm jc}$, $\nu_{\rm jrx}$ — числа атомов j-го элемента в газообразных, конденсированных компонентах системы и растворе, соответственно.

3. Закон сохранения заряда:

$$\sum_{k=1}^{K} q_{\rm ek} n_{\rm k} = 0 \quad ,$$

где $q_{\rm ek}$ — кратность ионизации k-го компонента (для электронного газа $q_{\rm ek}$ = -1).

4. Уравнение состояния смеси идеальных газов:

$$pV - R_0 T \sum_{k=1}^{K} n_k = 0 \quad ,$$

где *p* – давление.

Параметры равновесия термодинамической системы определяются решением математической задачи о нахождении экстремума с учетом всех ограничений с использованием функции

Лагранжа [7]. Для вычислений используют метод последовательных приближений Ньютона.

Эффективность и достоверность результатов термодинамического моделирования В значительной степени определяются представительностью веществ в базе термодинамических данных, а также точностью (достоверностью) и взаимной согласованностью свойств веществ, представленных в ней. Этим требованиям в полной мере удовлетворяет база термодинамических данных ИВТАНТЕРМО, используемая в программном комплексе "АСТРА" [9]. Кроме того, осуществлять программный комплекс позволяет размерности CM⁻³. равновесного состава системы В возможность прямо использовать полученные концентрации атомов и атомных ионов в разряда для последующего плазме интенсивности их спектральных линий.

Исходная информация для расчета состава и параметров равновесного состояния включает в себя данные трех типов [7, 8]:

- директивы к варианту расчета (определяются конкретной решаемой задачей);
- термодинамические свойства индивидуальных веществ, образующихся в равновесных условиях в рассматриваемом диапазоне температур;
- исходные данные, задающие полный химический состав термодинамической системы, и параметры, определяющие условия равновесия.

3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ

Основной сложностью при разработке моделей и практического применения метода равновесного термодинамического моделирования к решению реальных задач является выделение в рассматриваемой неравновесной термодинамической системе, какими обычно являются спектральные источники, квазиравновесных зон (термодинамических физические условия в которой близки к состоянию подсистем). термодинамического равновесия, локального что позволяет, равновесные следовательно. применять К НИМ расчеты. термодинамической системой (подсистемой) понимается совокупность условно выделенных взаимодействующих макроскопических тел (или областей), участвующих в изучаемом процессе. Все остальные тела окружающую систему. составляют среду, Взаимодействие термодинамической системы (подсистемы) с окружающей средой сводится к обмену теплом и работой.

Как уже отмечалось выше, отклонение от условий локального термодинамического равновесия в центральном канале факела

индуктивно связанной плазмы (аналитической зоне) не является слишком значительным. Следовательно, приняв выполнение условия локального термодинамического равновесия в этой зоне и используя некоторые усредненные характеристики плазмы (в первую очередь – температуру), можно достаточно просто описывать термохимические процессы атомизации, ионизации атомов и возбуждения спектральных линий.

Для метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС, ICP-AES, ICP-OES) предложена термодинамическая модель [6, 10], включающая следующие допущения.

- 1. Рассматривается зона центрального канала (аналитическая зона) на оси разряда, поскольку именно в эту зону вводится аэрозоль анализируемой пробы и из нее регистрируется основной поток излучения.
- 2. Аналитическая зона находится В СОСТОЯНИИ локального Это термодинамического равновесия. наиболее серьезное базирующееся опубликованных допущение, на ряде экспериментальных ПО исследованию физических данных характеристик плазмы, а также доказанное на основе большого объема сравнительного материала расчетов и экспериментов [6].
- 3. Компоненты системы равномерно распределены по объему аналитической зоны. Это допущение значительно упрощает моделирование и достаточно близко к истине при рассмотрении зоны центрального канала факела плазмы.
- 4. Плазма осесимметрична. Это подтверждается экспериментальными данными по изучению физических характеристик разряда [6].
- 5. Плазма оптически тонка и при расчете интенсивности спектральных линий нет необходимости учитывать ослабление потока излучения за счет самопоглощения. Справедливость данного допущения подтверждается широким линейным диапазоном градуировочных графиков (динамическим диапазоном) в данном методе анализа.
- 6. Разряд индуктивно связанной плазмы реализуется при атмосферном давлении.
- 7. Степень двукратной ионизации атомов принимается значимой только для элементов с самыми низкими вторыми потенциалами ионизации атомов (рис. 3.1) [11].
- 8. Исходный состав термодинамической системы задается численно равным скорости поступления компонентов плазмы в разряд (г/мин или моль/мин).

Ограничения применимости модели, в первую очередь, накладываются на операционные параметры плазмы: главным образом – на значения скорости пробоподающего потока аргона и скорости подачи пробы. При относительно высоких их значениях (при скоростях

пробоподающего потока аргона выше 1,3 л/мин и при скоростях подачи пробы выше 2,5 мл/мин) не происходит полного испарения аэрозоля и рассчитанный равновесный состава плазмы не вполне достоверно отражает реальную картину [6].

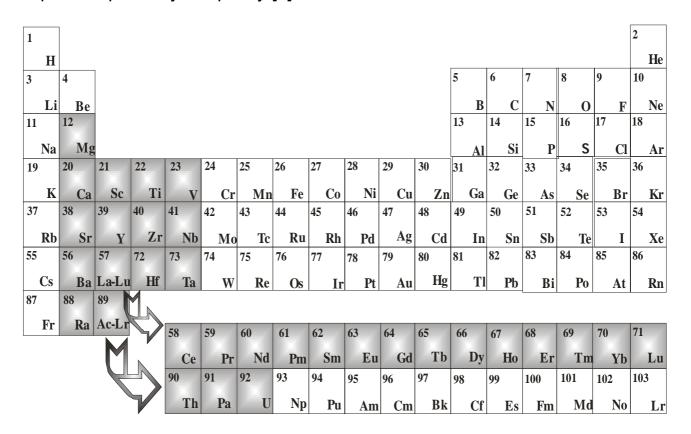


Рис. 3.1. Элементы Периодической таблицы, имеющие наиболее высокую вероятность образования ионов M²⁺ (выделены серым)

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА ПЛАЗМЫ

Как уже отмечено выше, исходная информация для расчета состава и параметров равновесного состояния с использованием программного комплекса «АСТРА» включает в себя данные трех типов.

4.1. Директивы к конкретному варианту расчета

Список директив и их описание приведены в [7, 8]. Для проведения расчетов равновесного состава плазмы обычно используются следующие директивы:

Inte – указание на то, что величины исходных данных задаются в технической системе единиц;

Prte – вывод результатов вычислений параметров (общих характеристик равновесия) в технической системе единиц;

lon – расчет производится с учетом возможности образования ионизированных компонентов;

Prfull — вывод равновесных концентраций для всех компонентов термодинамической системы (подсистемы);

Prc — вывод равновесного состава в размерности см⁻³, что позволяет прямо использовать полученные концентрации компонентов в плазме для последующего расчета интенсивности спектральных линий:

Step ПО этой директиве второй ИЗ задаваемых термодинамических параметров (давление или температура) изменяется по закону арифметической прогрессии. Используется при расчетов равновесного серии состава проведении зависимости от изменения одного какого-либо параметра, например, температуры, с определенным шагом;

Incomp – по этой директиве организуется ввод с экрана дисплея (из файла исходных данных) части термодинамических свойств индивидуальных веществ, в дополнение или взамен информации, хранящейся в базе данных.

4.2. Термодинамические свойства индивидуальных веществ

В используется наиболее надежная база расчетах термодинамических данных ИВТАНТЕРМО. Однако и в этой базе наборы термодинамических ОТСУТСТВУЮТ ряда индивидуальных веществ, которые МОГУТ образовываться высокотемпературной индуктивно связанной плазме. В первую очередь это относится к атомам и атомным ионам некоторых элементов.

Для учета в расчетах равновесия индивидуального вещества программный комплекс «АСТРА» позволяет, с использованием директивы **Incomp**, вводить необходимый комплект термодинамических данных этого вещества, который включает в себя:

- температурный диапазон аппроксимации зависимости приведенной энергии Гиббса (T_{\min} , T_{\max});
- численные коэффициенты φ_i, аппроксимирующие температурную зависимость приведенной энергии Гиббса:

$$\Phi(T) = \varphi_1 + \varphi_2 \ln\left(\frac{T}{10^4}\right) + \varphi_3 \left(\frac{T}{10^4}\right)^{-2} + \varphi_4 \left(\frac{T}{10^4}\right)^{-1} + \varphi_5 \left(\frac{T}{10^4}\right) + \varphi_6 \left(\frac{T}{10^4}\right)^2 + \varphi_7 \left(\frac{T}{10^4}\right)^3, \tag{4.1}$$

где T – температура;

– величину $DH = \Delta H^0_{298} - [H^0_{298} - H^0_{0}],$

где ΔH^0_{298} — стандартная энтальпия образования вещества из элементов, $[H^0_{298} - H^0_{0}]$ — приращение энтальпии от 0 до 298 К.

В Приложении 1 приведены комплекты термодинамических свойств для атомов, одно- и двухзарядных атомных ионов,

отсутствующие в базе термодинамических данных ИВТАНТЕРМО и в базах данных других программных комплексов. Эти комплекты рассчитаны и опубликованы в работах [9, 12, 13]. Кроме того, в этой таблице для ряда индивидуальных веществ приведены и ранее неопубликованные справочные данные, рассчитанные на кафедре физико-химических методов анализа УГТУ-УПИ и необходимые, по нашему опыту, для моделирования термохимических процессов в плазме индуктивно связанного разряда.

4.3. Исходные данные, задающие элементарный состав термодинамической системы, и параметры, определяющие условия равновесия

При выполнении расчетов полного равновесного состава рассматриваемой системы в первую очередь необходимо задать два термодинамических параметра, определяющих условия равновесия. Для моделирования процессов в индуктивно связанной плазме в качестве этих параметров целесообразно использовать температуру и давление.

Расчет равновесного состава проводят для давления 1 атм, поскольку индуктивно связанная плазма реализуется при атмосферном давлении. Температуру в расчетах задают согласно экспериментально определенным значениям температуры плазмы по собственным измерениям (оценкам) или по литературным данным. Если такие данные отсутствуют, то расчет проводится для диапазона 5000 ÷ 8000 К с постоянным дискретным шагом (например, 500 K).

Исходный химический состав термодинамической системы задают согласно используемым или предполагаемым в использовании экспериментальным условиям. Он включает в себя обязательно пробонесущий газ (аргон или какой-либо другой), а также компоненты, входящие в состав анализируемой пробы: вода (если анализируемый раствор — водный) или органический растворитель, определяемый элемент, матричные составляющие (катионные и анионные), включая присутствие кислот.

Исходный количественный состав термодинамической системы обычно задают численно равным массовым скоростям поступления всех рассматриваемых индивидуальных компонентов в плазму разряда (г/мин). Согласно предложенной модели [6], в расчетах учитывается только расход пробонесущего (центрального) потока газа. При задании массовой скорости поступления компонентов пробы в виде аэрозоля раствора (вода или другой растворитель, аналит, матричные катионы, кислота) необходимо обязательно учитывать эффективность конкретной распылительной системы, которая может быть определена экспериментально, найдена по литературным данным или оценена

приблизительно, исходя из известных характеристик распылителей и распылительных систем.

Например, при моделировании матричного влияния катионного состава пробы допускается использование усредненных приближенных значений эффективности распыления, которая для пневматического распылителя составляет 2 %, для ультразвукового – 10 %. Если используется ультразвуковой распылитель с десольвататором, то необходимо учитывать также степень десольватации аэрозоля, которая составляет обычно ~80 %.

Экспериментальные нагрузки значения плазмы аэрозолем необходимо обязательно учитывать при моделировании влияний пробы кислотного состава ИЛИ при использовании органических растворителей, так как именно В ЭТИХ случаях изменение эффективности подачи пробы будет определять состав плазмы.

Пример 4.1

Заданы следующие исходные операционные параметры плазмы:

- плазмообразующий поток аргона составляет 19 л/мин;
- пробоподающий (центральный) поток аргона $V_{Ar}^{\ \ \ } = 1,3$ л/мин;
- скорость подачи раствора V_{p-pa} = 2,1 мл/мин;
- используется поперечно-потоковый пневматический распылитель с эффективностью η = 3,5 %;
- потребляемая мощность разряда $W = 0.8 \div 1.9 \text{ кВт};$
- состав пробы: солянокислый (концентрация соляной кислоты C_{HCI} = 0,05 моль/л) водный раствор с концентрацией лантана C_{Ia} = 50 мкг/мл;

Необходимо рассчитать концентрации атомов и ионов лантана в аналитической зоне плазмы разряда при указанных операционных условиях анализа.

Решение примера 4.1

Первоначально нужно определить исходный химический состав системы, численно равный массовой скорости поступления Q (г/мин) компонентов плазмы, и составить список директив для расчета.

Скорость подачи аргона в центральный поток плазмы:

 $Q_{\rm Ar} = (V_{\rm Ar}^{\ \ \rm L} \cdot M_{\rm Ar})/V_{\rm m} = 1,3 \; (\mbox{п/мин}) \cdot 40 \; (\mbox{г/моль}) / 22,4 \; (\mbox{п/моль}) = 2,32 \; \mbox{г/мин}.$

Скорость подачи водяного аэрозоля в плазменный разряд:

 $Q_{H^2O} = V_{p-pa} \cdot \rho_{p-pa} \cdot \eta = 2,1 \text{ (мл/мин)} \cdot 1 \text{ (г/мл)} \cdot 0,035 = 0,074 \text{ г/мин}.$

Скорость введения кислоты, имеющейся в анализируемом водном растворе, в плазменный разряд:

 $Q_{\text{HCI}} = C_{\text{HCI}} \cdot M_{\text{HCI}} \cdot V_{\text{p-pa}} \cdot \eta = 0.05 \text{ (моль/л)} \cdot 36.5 \text{ (г/моль)} \cdot 2.1 \cdot 10^{-3} \text{ (л/мин)} \cdot 0.035 = 0.00013 \text{ г/мин}.$

Скорость введения аналита в плазменный разряд:

 $Q_{La} = C_{La} \cdot V_{p-pa} \cdot \eta = 50 \cdot 10^{-6} (г/мл) \cdot 2,1 (мл/мин) \cdot 0,035 = 3,7 \cdot 10^{-6} г/мин.$

Здесь M_{Ar} и M_{HCl} - молярная масса аргона и HCl, соответственно; V_{m} = 22,4 л — молярный объем газа при нормальных условиях; ρ_{p-pa} — плотность раствора.

Плазмообразующий поток аргона в расчетах не учитывается, так как, согласно принятым допущениям (раздел 3), рассматривается только пробоподающий поток аргона.

Большие вариации мощности плазменного разряда соответствует значительному изменению температуры в аналитической зоне плазмы. Принимаем решение рассматривать диапазон возможных температур в аналитической зоне от 5000 до 8000 К с постоянным шагом 500 К.

Лантан имеет низкое значение второго потенциала ионизации атомов (рис. 3.1), но термодинамические данные для иона La^{2+} в базе данных ИВТАНТЕРМО отсутствуют. Поэтому набор этих данных необходимо ввести из Приложения 1 дополнительно с использованием директивы **Incomp**.

Тогда список директив для расчета и исходный химический состав термодинамической системы будет следующим:

<Inte<Prte<Prfull<Ion<Prc<Step<Incomp>

 $p = 1,T = 5000,500,8000,\\ (2.32\%Ar),(0.074\%H2O),(0.00013\%H1CI),(0.0000037\%La);\\ +2*La,2500,12000,45.823,0,0,0,19.929,-7.323,0,486400;\\ end$

Примеры проведения расчетов концентрации атомов и атомных ионов для различных операционных условий анализа и составов проб приведены в [10].

5. РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ

После установления равновесного состава плазмы можно рассчитать интенсивности изучаемых эмиссионных спектральных линий элементов, используя найденные для фиксированных температур концентрации их соответствующих частиц. Расчет интенсивности атомных I_a (нижний индекс – а) и ионных I_i (нижний индекс – і) линий элементов производится по уравнению:

$$I_{a(i)} = \frac{h_{p} \cdot v_{a(i)} \cdot (Ag)_{a(i)}}{Z_{a(i)}(T)} \cdot n_{a(i)} \cdot \exp(-\frac{E_{a(i)}}{k \cdot T}),$$
 (5.1)

где $h_{\rm p}$ = 6,626·10⁻³⁴ Дж·с – постоянная Планка [14]; k = 1,380·10⁻²³ Дж/К – постоянная Больцмана [14]; $v_{\rm a(i)}$ – частота спектральной линии, c^{-1} ; $v_{\rm a(i)}$ = $\frac{c}{\lambda_{\rm co}}$;

 $\lambda_{a(i)}$ — длина волны спектральной линии, м; $c = 2,997 \cdot 10^8$ м/с — скорость света в вакууме [14]; T — температура, K;

 $n_{a(i)}$ — концентрация атомов (ионов) в плазме, м⁻³, полученная в результате термодинамических расчетов для определенной температуры конкретной термодинамической системы, реализуемой в индуктивно связанной плазме;

 $E_{a(i)}$ — потенциал возбуждения атомной (ионной) линии, Дж. Значения $E_{a(i)}$ приведены в таблицах спектральных линий (обычно в электронвольтах): например, [15] (1 эВ = 1,602·10⁻¹⁹ Дж);

 $(Ag)_{a(i)}$ — вероятность перехода и статистический вес возбужденного уровня атомной или ионной линии. Значения рекомендуется брать из базы данных NIST [16]. Если необходимые сведения в этой базе данных отсутствуют, то можно воспользоваться справочником [17], однако приведенные в нем значения указанных величин являются менее точными;

 $Z_{a(i)}$ (*T*) — сумма по состояниям атомов (ионов), рассчитываемая для атомов и ионов элементов в зависимости от температуры.

В Приложении 2 приведены значения аппроксимирующих коэффициентов температурной зависимости $Z_{a(i)}(T)$ для атомов и ионов элементов:

$$Z_{a(i)}(T) = a + b \cdot \left(\frac{T}{10^3}\right) + c \cdot \left(\frac{T}{10^3}\right)^2 + d \cdot \left(\frac{T}{10^3}\right)^3 + e \cdot \left(\frac{T}{10^3}\right)^4 + f \cdot \left(\frac{T}{10^3}\right)^5,$$
 (5.2)

а также указан температурный диапазон аппроксимации зависимости сумм по состояниям (T_{\min} , T_{\max}).

Как видно из Приложения 2, полиномиальные коэффициенты, взятые из работ [18] и [19], определены для различных температурных диапазонов. Установлено, что рассчитанные суммы по состояниям для атомов и ионов ряда элементов для T = 7000 К по данным этих двух источников не совпадают между собой. Поэтому для расчетов в нижнем диапазоне от 3000 до 6000 К нужно использовать данные из [18], а в верхнем диапазоне от 8000 до 10000 К — из [19]. Для промежуточного диапазона от 6000 до 8000 К нужно применять данные, полученные аппроксимацией переходов от нижнего диапазона к верхнему.

В INTERNET имеется очень удобная программа для определения сумм по состояниям атомов и однократно заряженных ионов при заданной температуре, которую можно найти по адресу http://www.thespectroscopynet.com/Theory/Partition_Functions.asp?submitted=true, однако использованные в ней справочные данные по энергетическим уровням не указаны.

Точные значения энергий ионизации атомов и ионов, а также значений необходимых физических констант также можно найти в INTERNET: http://www.physics.nist.gov/cuu/index/html.

6. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

6.1. Влияние температуры плазмы на интенсивность спектральных линий

Температура образом, плазмы определяется, главным высокочастотной мощностью, вкладываемой в плазму, и скоростью транспортирующего потока газа. С повышением мощности разряда и снижением потока транспортирующего температура газа увеличивается. Кроме того, температура определяется также высотой наблюдения плазмы. Изучив температурную зависимость интенсивности спектральных линий можно рекомендовать лучшие операционные параметры для аналитических измерений.

Расчет температурной зависимости интенсивности спектральных линий проводится в диапазоне температур, характерных для различных режимов плазмы индуктивно связанного разряда (5000 – 8000 K) с шагом 500 K при давлении 1 атм.

Алгоритм проведения расчетов обычно реализуется в следующем порядке.

- 1. Задают расход центрального потока аргона или используют его экспериментальное значение. Переводят объемный (л/мин) расход газа в массовый (г/мин).
- 2. Задают или используют экспериментальные значения анализируемого раствора и эффективности распылительной системы. Состав анализируемого раствора включает в себя растворитель (обычно вода), матричные компоненты (солевой, кислотный состав), аналит. Если неизвестны экспериментальные значения эффективности генерации аэрозоля, ее принимают равной 2 % для пневматического распылителя 10 % для ультразвукового. Если распылитель с десольвататором, ультразвуковой TO необходимо учитывать также степень десольватации аэрозоля, которая составляет обычно ~80 %. Затем определяют массовую скорость (г/мин) введения компонентов аэрозоля в плазму.
- 3. Составляют список директив для расчета, задают два термодинамических параметра (давление, температуру), исходный химический состав термодинамической системы, численно равный массовой скорости введения исходных составляющих плазмы. С использованием директивы **Incomp** вводят отсутствующие в базе данных ИВТАНТЕРМО термодинамические свойства атомов и атомных ионов (Приложение 1).
- 4. Вводят исходную информацию в ЭВМ и с использованием программного комплекса рассчитывают свойства и равновесный состав термодинамической системы.

5. Исходя из полученных в ходе расчета равновесных концентраций атомов и ионов аналита по уравнению (5.1) рассчитывают интенсивность соответствующих спектральных линий, используя справочные данные по необходимым атомным константам.

Пример 6.1

Исходные условия для расчетов соответствуют примеру 4.1. Требуется рассчитать зависимость интенсивности спектральных линий La I 521,186; La II 408,672 и La III 237,938 нм от температуры.

Решение примера 6.1

Порядок действий аналитика должен быть следующим.

1. В справочной литературе необходимо предварительно найти необходимые константы для атомных и ионных спектральных линий лантана (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Спектральные характеристики аналитических линий лантана: $E_{a(i)}$ - потенциалы возбуждения атомных (ионных) линий, $(Ag)_{a(i)}$ — вероятности переходов и статистические веса возбужденных уровней атомных и ионных линий

Аналитическая линия, нм	$(Ag)_{a (i)}, 10^{-8} c^{-1} [17]$	Е _{а (i)} , эВ [15]
La I 521,186	2,0	2,89
La II 408,672	1,0	3,03
La III 237,938	1,0*	5,21

Примечание: * – принято условно из-за отсутствия справочных данных.

- 2. Рассчитывают по уравнению (5.2) для фиксированных изучаемых температур суммы по состояниям атомов и ионов, используя справочные данные из Приложения 2.
- 3. С использованием программного комплекса «АСТРА» рассчитывают равновесные концентрации атомов и атомных ионов аналита (табл. 6.2). Список директив к расчету и исходный состав системы приведены в примере 4.1.
- 4. По уравнению (5.1) рассчитывают интенсивность соответствующих спектральных линий (рис. 6.1, табл. 6.3).

Примеры расчетов температурных зависимостей интенсивности спектральных линий атомов и атомных ионов различных элементов можно также найти в работах [22, 23].

Таблица 6.2 Суммы по состояниям Z(T) и равновесные концентрации n атомов и атомных ионов лантана

Томпоро	Z(T)			<i>п</i> , см ⁻³			
Темпера- тура, К	La I	La II	La III	La I	La II	La III	
4000	20,00	25,16	8,20	8,7046·10 ⁶	2,0287·10 ⁹	1,6677·10 ⁴	
4500	23,29	27,37	8,73	2,5747·10 ⁷	3,1357·10 ¹⁰	8,0073·10 ⁶	
5000	26,94	29,53	9,25	1,1371·10 ⁸	1,9212·10 ¹¹	2,9174·10 ⁸	
5500	30,97	31,68	9,75	2,7170·10 ⁸	$3,8334\cdot10^{11}$	1,6376·10 ⁹	
6000	35,44	33,85	10,24	3,7731·10 ⁸	4,2014·10 ¹¹	3,9690·10 ⁹	
6500	40,37	36,05	10,71	4,5106·10 ⁸	3,9976·10 ¹¹	7,2825·10 ⁹	
7000	45,78	38,30	11,16	5,1475·10 ⁸	$3,6974\cdot10^{11}$	1,1767·10 ¹⁰	
7500	51,69	40,60	11,59	5,7199·10 ⁸	$3,3939\cdot10^{11}$	1,7467·10 ¹⁰	
8000	58,10	42,97	12,01	6,2151·10 ⁸	3,1022·10 ¹¹	2,4258·10 ¹⁰	
8500	65,03	45,39	12,41	6,6123·10 ⁸	2,8241·10 ¹¹	3,1856·10 ¹⁰	
9000	72,45	47,88	12,79	6,8927·10 ⁸	2,5597·10 ¹¹	3,9861·10 ¹⁰	

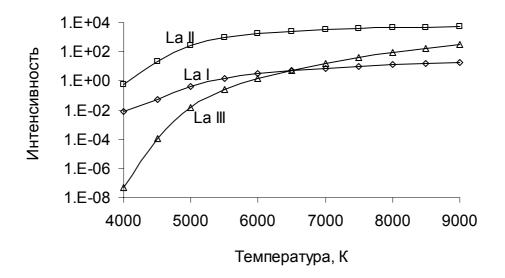


Рис. 6.1. Зависимость интенсивности спектральных линий лантана (La I 521,186; La II 408,672 и La III 237,938 нм) от равновесной температуры плазмы

Температура, К	La I 521,186 нм	La II 408,672 нм	La III 237,938 нм
4000	0,008	0,597	4,64·10 ⁻⁸
4500	0,049	22,528	1,12·10 ⁻⁴
5000	0,393	279,43	0,015
5500	1,505	984,87	0,236
6000	3,035	1720,9	1,362
6500	4,896	2413,1	5,188
7000	7,122	3091,5	15,633
7500	9,646	3741,6	39,788
8000	12,33	4331,4	88,139
8500	15,00	4833,0	174,71
9000	17,47	5226,6	314,90

6.2. Изучение и прогнозирование матричных влияний

В качестве степени влияния $\gamma(An)_{Mt}$ матричного элемента Mt (матричный неспектральный эффект) на аналитический сигнал определяемого An (аналит) элемента удобно использовать соотношение интенсивностей спектральной линии определяемого элемента в присутствии (нижний индекс – Mt) и в отсутствие (H_2O) матричных элементов:

$$\gamma(An)_{Mt} = I(An X)_{Mt} / I(An X)_{H2O},$$
 (6.1)

где X = I или II для атомной или ионной линии, соответственно.

Расчет значений γ (An I)_{Mt} с использованием уравнения (6.1) и учетом принятого допущения, что введение матричного элемента не изменяет температуру плазмы, приводит к следующему выражению

 γ (An X)_{Mt} = I(An X)_{Mt} / I(An X)_{H2O} = n(An X)_{Mt} / n(An X)_{H2O}, (6.2) где n(An X) — концентрация атомов (ионов) аналита в плазме. Это позволяет очень просто по результатам термодинамического моделирования определять значения γ (An X)_{Mt}.

Для решения задачи предварительно необходимо провести расчет равновесного состава плазмы для двух термодинамических систем (не содержащей и содержащей матричные вещества) в интересующем

температурном диапазоне. В расчетах нужно использовать конкретную известную температуру плазмы, или, для прогнозных расчетов, рекомендуется использовать температурный диапазон $5000 \div 8000$ К с постоянным шагом 500 К. По рассчитанной зависимости $\gamma(An)_{Mt} = f(T)$ (рис. 6.2) можно судить об уровне матричных неспектральных влияний, а также подбирать оптимальный температурный режим анализа.

Пример 6.2

Необходимо оценить матричные неспектральные влияния со стороны катионного состава пробы на интенсивность спектральных линий Li I 670,78; Ba I 553,55; Zn I 213,86 нм. Предполагается использовать следующие экспериментальные условия анализа:

- плазмообразующий поток аргона составляет 10 л/мин;
- пробоподающий (центральный) поток аргона $V_{Ar}^{\ \ \mu} = 1$ л/мин;
- скорость подачи раствора V_{p-pa} = 1 мл/мин;
- применяется пневматический распылитель с эффективностью η = 2 %;
- состав пробы: солянокислый водный раствор с C_{HCI} = 0,05 моль/л; аналит Ва, Li, Zn с массовой концентрацией элемента Ме C_{Me} = 5 мкг/мл; матрица KCI с массовой концентрацией C_{K} = 10 мг/мл.

Решение примера 6.2

Список директив, с учетом отсутствия в базе данных термодинамических свойств индивидуальных веществ Ba⁺, Ba²⁺, La²⁺ и исходный состав термодинамических систем будет следующим. Система 1 (не содержащая матрицу):

```
<Inte<Prte<Prfull<Ion<Prc<Step<Incomp>
```

p=1,T=5000,500,8000,

(1.78%Ar),(0.02%H2O),(0.0000365%H1Cl),(0.0000001%Li),

(0.000001%Ba),(0.000001%Zn);

- +1*Ba,2500,6500,41.438,0,0,0,30.891,-7.366,0,163200;
- +1*Ba,7000,12000,46.938,0,0,0,13.585,-3.537,0,163200;
- +2*Ba,2500,12000,42.819,0,0,0,16.425,-6.034,0,393800;
- +2*La,2500,12000,45.823,0,0,0,19.929,-7.323,0,486400; end

Система 2 (содержащая матрицу):

<Inte<Prte<Prfull<Ion<Prc<Step<Incomp>

p=1,T=4000,500,9000,

(1.78%Ar),(0.02%H2O),(0.0000365%H1Cl),(0.0000001%Li),

(0.000001%Ba),(0.0000001%Zn),(0.0002%K1Cl);

- +1*Ba,2500,6500,41.438,0,0,0,30.891,-7.366,0,163200;
- +1*Ba,7000,12000,46.938,0,0,0,13.585,-3.537,0,163200;
- +2*Ba,2500,12000,42.819,0,0,0,16.425,-6.034,0,393800;
- +2*La,2500,12000,45.823,0,0,0,19.929,-7.323,0,486400; end

В табл. 6.4 приведены результаты расчета равновесной концентрации атомов аналитов для двух рассматриваемых систем, а также значения матричного влияния хлорида калия на интенсивность спектральных линий в зависимости от температуры. Графически данные зависимости представлены на рис. 6.2.

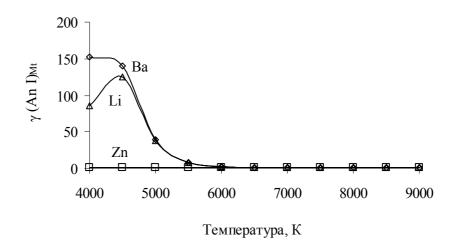


Рис. 6.2. Матричное влияние 10 мг/мл КСІ на интенсивность спектральных линий Ва I 553,55 нм, Li I 670,88 нм и Zn I 213,86 нм (γ (An I)_{KCI} = I(An I)_{KCI}/I(An I)_{H2O}) в индуктивно связанной плазме в зависимости от температуры плазмы

Аналогичный пример моделирования матричных неспектральных влияний на интенсивность спектральных линий описан в работе [10].

6.3. Снижение пределов обнаружения элементов

Согласно выражениям для интенсивности спектральной линии (5.1)степени ионизации (уравнение элемента Caxa) интенсивность каждой спектральной линии атома или атомного иона любого элемента при определенной температуре плазмы концентрации электронов в ней достигает максимума. Положение максимума зависит сложным образом от степени ионизации элемента, распределения заселенностей его энергетических уровней потенциала возбуждения рассматриваемой линии. Известно, что для индуктивно связанной плазмы положение максимума интенсивности спектральной линии коррелирует с высотой зоны наблюдения плазмы в соответствии с изменением температуры плазмы.

Детальные расчеты температурной зависимости интенсивности спектральных линий показали следующее [6]:

 температурные максимумы заметно зависят от соотношения мольных долей аргона, растворителя, аналита и матрицы пробы, так как это влияет на концентрацию электронов в плазме; Таблица 6.4 Равновесные концентрации атомов (n(An I)_{Mt}) Ва, Li, Zn для систем, содержащей матричный элемент и без него, и значения матричного влияния γ (An I)_{Mt} на интенсивность спектральных линий этих атомов.

Темпе-		n(An I) _{Mt}						(Ap.1)		
ратура, К		Система 1			Система 2			γ(An I) _{Mt}		
K	Ва	Li	Zn	Ва	Li	Zn	Ва	Li	Zn	
4000	1,0462·10 ⁷	3,0830·10 ⁹	5,6442·10 ¹⁰	1,5921·10 ⁹	2,6459·10 ¹¹	5,6787·10 ¹⁰	152,179	85,822	1,006	
4500	1,4370·10 ⁶	4,5538·10 ⁸	4,4244·10 ¹⁰	2,0153·10 ⁸	5,6712·10 ¹⁰	5,0367·10 ¹⁰	140,244	124,538	1,138	
5000	8,1533·10 ⁵	2,8782·10 ⁸	2,8981·10 ¹⁰	3,2229·10 ⁷	1,1052·10 ¹⁰	4,4723·10 ¹⁰	39,529	38,399	1,543	
5500	8,0708·10 ⁵	3,2504·10 ⁸	1,9863·10 ¹⁰	6,7301·10 ⁶	2,6765·10 ⁹	3,6497·10 ¹⁰	8,339	8,234	1,837	
6000	8,3164·10 ⁵	3,8959·10 ⁸	1,4020·10 ¹⁰	2,0091·10 ⁶	9,3450·10 ⁸	2,2156·10 ¹⁰	2,416	2,399	1,580	
6500	8,3431·10 ⁵	4,6124·10 ⁸	1,0109·10 ¹⁰	1,1140·10 ⁶	6,1391·10 ⁸	1,2281·10 ¹⁰	1,335	1,331	1,215	
7000	7,8821·10 ⁶	5,3439·10 ⁸	7,4469·10 ⁹	8,7989·10 ⁶	5,9004·10 ⁸	8,0311·10 ⁹	1,116	1,104	1,078	
7500	9,6044·10 ⁶	6,0607·10 ⁸	5,6040·10 ⁹	1,0041·10 ⁷	6,2996·10 ⁸	5,7829·10 ⁹	1,045	1,039	1,032	
8000	1,1269·10 ⁷	6,7410·10 ⁸	4,3014·10 ⁹	1,1496·10 ⁷	6,8548·10 ⁸	4,3629·10 ⁹	1,020	1,017	1,014	
8500	1,2805·10 ⁷	7,3657·10 ⁸	3,3597·10 ⁹	1,2930·10 ⁷	7,4241·10 ⁸	3,3830·10 ⁹	1,010	1,008	1,007	
9000	1,4155·10 ⁷	7,9160·10 ⁸	2,6628·10 ⁹	1,4227·10 ⁷	7,9475·10 ⁸	2,6722·10 ⁹	1,005	1,004	1,004	

- интенсивности атомных линий элементов могут обнаруживать низкотемпературный и высокотемпературный максимумы, а степень проявления максимумов зависит от потенциала ионизации атомов аналита и их концентрации в плазме;
- термохимическое поведение элементов индивидуально: эффективность образования атомов элементов определяется их термодинамическими свойствами, а также химическим составом и термодинамическими свойствами остальных составляющих системы. Поэтому рассмотрение в моделях упрощенных исходных химических систем (обычно это аргон и аналит) будет приводить к ошибочным заключениям по ходу зависимостей интенсивностей спектральных линий от температуры, особенно в низкотемпературной области (до 5000 К).

Снижению пределов обнаружения отвечают те условия анализа, при которых наблюдается максимально возможная интенсивность аналитической линии. Расчет выполняется согласно разделу 6.1.

Пример расчетного нахождения температуры, обеспечивающей максимальную интенсивность спектральных линий определяемых элементов приведен в [23].

6.4. Выбор элемента внутреннего стандарта и его спектральной линии

Для снижения погрешности определения интенсивности спектральных линий аналитов в атомно-эмиссионной спектрометрии используют прием введения внутреннего стандарта в пробы и образцы сравнения. Выбор элемента внутреннего стандарта и его спектральной линии обычно проводят на основе близости первого потенциала ионизации атомов и потенциала возбуждения спектральной линии с аналогичными характеристиками для аналита. Однако, как показали исследования, выполненные в [6], большой вклад в идентичность поведения интенсивности спектральных линий внутреннего стандарта и аналита вносит также ход температурной зависимости суммы по состояниям атомов этих элементов Z(T).

Поэтому подбор оптимальных внутреннего стандарта и его спектральной линии в методе атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой более точно и быстрее можно провести методом термодинамического моделирования, используя количественные расчетные оценки.

6.4.1. Коррекция матричных влияний

Для коррекции матричных неспектральных влияний рекомендуется следующий алгоритм моделирования.

- 1. Определяют круг предполагаемых элементов внутреннего стандарта и их спектральные линии.
- 2. Задают предполагаемый диапазон изменения концентрации матричных элементов.
- 3. Задают температурный диапазон (для прогнозных оценок рекомендуется рассмотреть диапазон от 5000 до 8000 К с шагом 500 К).
- 4. При каждом значении температуры проводят расчет равновесного состава рассматриваемой системы.
- 5. Используя найденные значения равновесных концентраций атомов (ионов) аналита и элемента внутреннего стандарта рассчитывают интенсивность их спектральных линий и отношение интенсивностей.
- 6. Получают графические зависимости отношения интенсивности рассматриваемых спектральных линий от концентрации матричного элемента при каждом значении температуры плазмы.
- 7. Выбирают наилучший элемент внутреннего стандарта и его спектральную линию, а также температурный режим работы плазмы. Оптимальным является вариант, когда отношение интенсивностей не зависит или очень слабо зависит от концентрации матричного элемента.

Примеры расчетного выбора элемента внутреннего стандарта и его спектральной линии приведены в [25, 26].

6.4.2. Использование корреляционных коэффициентов

выборе внутреннего стандарта ДЛЯ компенсации неконтролируемых изменений операционных параметров наиболее предпочтительным является способ расчета корреляционных коэффициентов. Для реализации способа необходимо ЭТОГО использовать следующий алгоритм действий.

- 1. Выбирают ряд элементов, потенциально пригодных к применению в качестве внутреннего стандарта, и их спектральные линии на основе сравнения с аналогичными параметрами (потенциал ионизации, потенциал возбуждения) аналита и его спектральной линии.
- 2. Для учета влияния изменения температуры плазмы, вызываемого в первую очередь колебаниями мощности плазмы, производят расчет равновесного состава термодинамической системы в диапазоне температур $5000 \div 8000$ К с постоянным шагом 500 К. Рассчитывают температурные зависимости интенсивности аналитических линий $I_{\rm ah.}$ и линий сравнения $I_{\rm Bh.ct.}$. Для каждого температурного поддиапазона $T \pm 500$ К определяют зависимости $I_{\rm ah.} = f(T)$ и $I_{\rm Bh.ct.} = f(T)$. Эти зависимости аппроксимируют в прямые и по величине угла между ними оценивают значение индивидуального коэффициента корреляции R_T :

при расчетах упрощенно принимается $R_T = 1$, если прямые параллельны, и $R_T = 0$, если прямые перпендикулярны.

- 3. Рассчитывают индивидуальный коэффициент корреляции, учитывающий нестабильность в подаче аргона $R_{\rm Ar}$. Для этого при исследуемых температурах плазмы теоретически определяют зависимость $I_{\rm ah.} = f(V_{\rm Ar}^{\ \ \ \ })$ и $I_{\rm Bh.ct.} = f(V_{\rm Ar}^{\ \ \ \ })$. При этом принимают изменение в расходе центрального потока аргона \pm 20 % от номинального значения. Значения $R_{\rm Ar}$ оценивают аналогично $R_{\rm T}$.
- 4. Рассчитывают индивидуальный коэффициент корреляции, учитывающий нестабильность в подаче пробы $R_{\rm аэроз}$. Для этого теоретически определяют зависимость $I_{\rm ah.} = f(V_{\rm аэроз})$ и $I_{\rm Bh.ct.} = f(V_{\rm аэроз})$. В термодинамических расчетах учитывают изменение в скорости подачи пробы \pm 20 % от номинального значения. Значение $R_{\rm аэроз}$ оценивают аналогично $R_{\rm T}$.
- 5. При каждом значении температуры рассчитывают суммарный коэффициент корреляции $R_{\text{расч}}$, учитывающий одновременное влияние трех исследуемых факторов по соотношению $R_{\text{расч}}$ = 1/3(R_{T} + R_{Ar} + $R_{\text{аэроз}}$).
- 6. На основе сравнения рассчитанных коэффициентов корреляции $R_{\text{расч}}$ количественно проводят выбор элемента внутреннего стандарта и его спектральной линии. Наилучшим вариантом считается, когда $R_{\text{расч}} \to 1$.

Пример 6.3

На основе расчета корреляционных коэффициентов выбрать наилучший элемент внутреннего стандарта и его спектральную линию при определении Са с использованием аналитической линии Са II 393,36 нм. Для выбора предлагаются следующие линии сравнения Ar I 415,85; In I 451,13; Sr II 407,77; Sc II 361,38 нм.

Предполагается использовать следующие экспериментальные условия:

- плазмообразующий поток аргона составляет 10 л/мин;
- пробоподающий (центральный) поток аргона $V_{Ar}^{\ \ \mu}$ = 1,1 л/мин;
- скорость подачи раствора V_{p-pa} = 1 мл/мин;
- пневматический распылитель с эффективностью η = 2 %;
- состав пробы: определяемый элемент и элемент внутреннего стандарта с массовой концентрацией C_{Me} = 50 мкг/мл.

Таким образом, для изучения раздельного влияния трех основных параметров индуктивно связанной плазмы нужно рассмотреть системы с исходным составом, представленным в табл. 6.5.

Решение примера 6.3

Для всех рассматриваемых систем необходимо провести расчеты равновесного состава в диапазоне изменения температур $5000 \div 8000 \, \text{K}$ с шагом $500 \, \text{K}$.

После определения равновесного состава изучаемых систем для всех пар аналитических линий рассчитывают интенсивности спектральных линий и их отношений в зависимости от варьируемых параметров и нормируют эти значения. В качестве примера такие данные приведены для аналитической пары Са II 393,36 — In I 451,13 нм при температуре плазмы 5000 К (табл. 6.6).

Таблица 6.5 Состав термодинамических систем Ar — H₂O — Аналит — Внутренний стандарт

Варьируемый	Степень изменения	Массовая скорость поступления компонентов, г/мин					
параметр	параметра, %	Ar	H ₂ O	Аналит	Внутренний стандарт		
	- 20	1,568	0,02	1·10 ⁻⁶	1·10 ⁻⁶		
	- 10	1,764	0,02	1·10 ⁻⁶	1·10 ⁻⁶		
Центральный поток аргона	0	1,96	0,02	1·10 ⁻⁶	1·10 ⁻⁶		
no ron aprona	+ 10	2,156	0,02	1·10 ⁻⁶	1·10 ⁻⁶		
	+ 20	2,352	0,02	1·10 ⁻⁶	1·10 ⁻⁶		
	- 20	1,96	0,016	8·10 ⁻⁷	8·10 ⁻⁷		
	- 10	1,96	0,018	9·10 ⁻⁷	9·10 ⁻⁷		
Расход аэрозоля	0	1,96	0,02	1·10 ⁻⁶	1·10 ⁻⁶		
	+ 10	1,96	0,022	1,1·10 ⁻⁶	1,1·10 ⁻⁶		
	+ 20	1,96	0,024	1,2·10 ⁻⁶	1,2·10 ⁻⁶		

Используя нормированные значения, получают графические зависимости интенсивности спектральных линий при изменении параметров ДЛЯ каждого фиксированного влияющих значения температуры плазмы. В качестве примера на рис. 6.3 приведены такие зависимости для спектральных линий Са II 393,36 и In I 451,13 нм при температуре плазмы 5000 К. Аппроксимируют данные зависимости в прямые и по значению угла между ними рассчитывают индивидуальные коэффициенты корреляции (табл. 6.7). Затем рассчитывают суммарный коэффициент корреляции $R_{\text{расч}}$, учитывающий одновременное влияние исследуемых факторов, как среднее арифметическое индивидуальных коэффициентов корреляции (табл. 6.7).

Таблица 6.6 Влияние варьируемых параметров на интенсивность спектральных линий аналита и элемента внутреннего стандарта при температуре плазмы 5000 К

Влияющий параметр		Интенсі аналитиче	ивность Ских линий	Нормированные значения интенсивности аналитических линий		
		Са II 393,36 нм	In I 451,13 нм	Са II 393,36 нм	In I 451,13 нм	
	4500	4767,01	52,64	1,00	1,00	
<i>T</i> , K	5000	9413,00	26,50	1,97	0,50	
	5500	16019,78	34,86	3,36	0,66	
	0,88	11564,68	37,39	1,00	1,00	
	0,99	10405,98	31,29	0,90	0,84	
V _{Ar} ^ц , л/мин	1,1	9413,30	26,49	0,81	0,71	
	1,21	8593,35	22,83	0,74	0,61	
	1,32	7936,64	20,09	0,69	0,54	
	0,8	7629,84	18,87	1,00	1,00	
	0,9	8527,36	22,55	1,12	1,19	
V _{p-pa} , мл/мин	1,0	9413,30	26,49	1,23	1,40	
	1,1	10287,66	30,70	1,35	1,63	
	1,2	11150,86	35,15	1,46	1,86	

Исходя из полученных результатов можно рекомендовать наилучший элемент внутреннего стандарта и его спектральную линию.

Подобный пример оценки применимости элемента внутреннего стандарта и его спектральной линии на основе расчетных коэффициентов корреляции описан в [25].

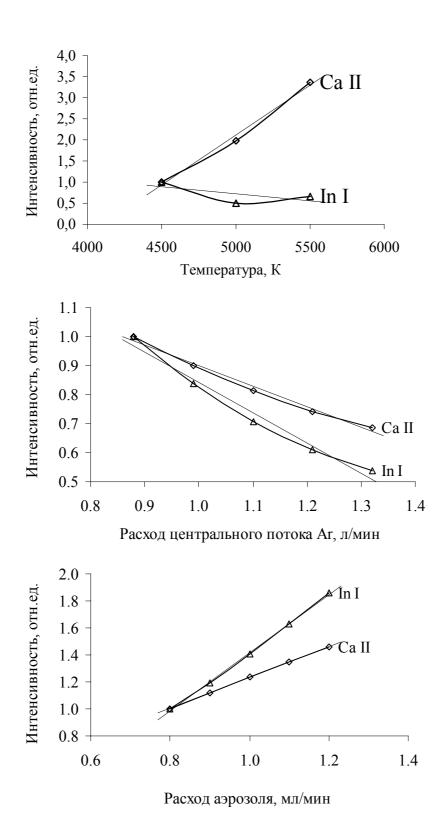


Рис. 6.3. Влияние температуры, изменения расхода центрального потока аргона и расхода аэрозоля на интенсивности спектральных линий Са II 393,36 и In I 451,13 нм при температуре плазмы 5000 К. Аппроксимация расчетных зависимостей (прямые линии)

Таблица 6.7

Значения рассчитанных индивидуальных коэффициентов корреляции для спектральной линии Са II 393,36: $R_{\rm T}$, $R_{\rm Ar}$, $R_{\rm aspo3}$ — коэффициенты корреляции изменения интенсивности аналитических пар линий, учитывающие влияние одного из изучаемых факторов: температуры, расхода аргона и расхода аэрозоля соответственно; суммарный коэффициент корреляции $R_{\rm pacч}$, учитывающий одновременное влияние трех исследуемых факторов

Коэффи-	Темпера-	Линия сравнения, нм					
циент корреляции	тура, К	Ar I 415,85	In I 451,13	Sr II 407,77	Sc II 361,38		
	5000	0,527	0,571	0,980	0,878		
D	6000	0,528	0,868	0,979	0,950		
R_T	7000	0,531	0,867	0,972	0,949		
	8000	0,538	0,893	0,965	0,949		
	5000	0,564	0,879	0,9998	0,992		
D	6000	0,564	0,967	0,9995	0,9994		
R_{Ar}	7000	0,558	0,985	0,9994	0,9998		
	8000	0,548	0,993	0,9995	0,9998		
	5000	0,415	0,821	0,9995	0,987		
D	6000	0,414	0,950	0,9993	0,9991		
R _{aэpo3}	7000	0,414	0,977	0,9991	0,9998		
	8000	0,414	0,989	0,9992	0,9997		
	5000	0,502	0,757	0,993	0,952		
R _{расч}	6000	0,502	0,928	0,993	0,982		
	7000	0,501	0,943	0,990	0,983		
	8000	0,515	0,958	0,988	0,983		

6.5. Аксиально наблюдаемая плазма

При аксиальном наблюдении плазмы регистрируемое излучение поступает из различных температурных зон вдоль факела плазмы.

В этом случае применение эффективной температуры плазмы при термодинамических расчетах, в отличие от радиально наблюдаемой плазмы, не позволяет адекватно описывать явления, наблюдаемые при аксиальном отборе излучения.

В связи с этим для аксиально наблюдаемой плазмы предложена модель, которая учитывает температурное распределение вдоль по факелу плазмы. Данная модель предполагает разбиение факела плазмы вдоль оси наблюдения по зонам (5 – 6 зон), имеющим различные температуры, которые соответствуют экспериментально определенному аксиальному профилю температуры. Для зоны температурной рассчитывается парциальная интенсивность спектральных линий (I_i) И затем качестве теоретического В аналитического сигнала для каждой спектральной линии используется сумма этих интенсивностей $I = \sum I_i$.

Если экспериментальный температурный профиль вдоль по факелу плазмы не определен, возможно использование аксиального распределения температуры, взятого из другой экспериментальной работы. Но при этом операционные параметры плазмы, используемые при определении распределения температуры, должны быть по возможность близки к операционным параметрам моделируемой плазмы.

Пример 6.4

Оценить уровень матричных неспектральных влияний элементов Ca, Mg, Na и Li на интенсивность атомной линии калия К I 766,49 нм при аксиальном наблюдении плазмы.

Предполагается использовать следующие экспериментальные условия:

- плазмообразующий поток аргона составляет 15 л/мин;
- пробоподающий (центральный) поток аргона $V_{\rm Ar}^{\ \mu}$ = 0,55 л/мин;
- скорость подачи раствора V_{p-pa} = 1 мл/мин;
- пневматический распылитель с эффективностью η = 2 %;
- состав пробы: азотнокислый водный раствор C_{HNO_3} = 1 %; матричный элемент (Ca, Mg, Na, Li) с массовой концентрацией C_{Me} = 250 мг/л; аналит C_{K} = 20 мг/л;
- мощность W = 1,35 кВт.

Решение примера 6.4

В этом случае при моделировании нужно рассмотреть следующие термодинамические системы (Ar - H₂O - HNO₃ - K), (Ar - H₂O - HNO₃ - Mt - K) с исходным составом: расход центрального потока аргона - 0,982 г/мин: H₂O - 0,02 г/мин: HNO₃ - 0,0002 г/мин; матричного элемента - 5·10⁻⁶ г/мин, аналита - 4·10⁻⁷ г/мин.

Экспериментальное аксиальное распределение температуры T вдоль осевой зоны факела плазмы при близких операционных условиях анализа было определено, например, в работе [2] при мощности плазмы 1,5 кВт и расходе центрального потока аргона 1,2 л/мин (табл. 6.8). Его можно использовать для решения данного примера.

Первоначально проводят расчет равновесного состава плазмы, как в случае ввода матричного элемента, так и без него для выделенных, например, шесть температурных зон вдоль факела плазмы. Затем, используя полученные в этих расчетах равновесные концентрации атомов калия В каждой зоне определяют интенсивности аналитической линии К I 766,49 нм для каждой выделенной температурной зоны плазмы (табл. 6.8). Согласно наблюдаемой ДЛЯ аксиально плазмы качестве модели, аналитического сигнала используют сумму интенсивностей атомной линии калия по всем зона наблюдения. Тогда, например, расчет увеличения сигнала калия В присутствии различных матричных элементов (Mt) можно провести по формуле (рис. 6.4):

Увеличение сигнала =
$$\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \left(I(\text{K I 766,49})_{\text{Mt}}\right.}{\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \left(I(\text{K I 766,49})_{\text{H}_{2}\text{O}}\right.} \ \ 100 \ \% \ .$$

Таблица 6.8 Значения интенсивностей атомной линии калия I (К I) для водных растворов (нижний индекс H_2O) и растворов содержащих матричные элементы (Ca, Mg, Na или Li) в концентрации 0,25 г/л (нижний индекс Ca, Mg, Na или Li, соответственно) при различных высотах наблюдения

<u>) </u>						-11-
Высота наблюдения <i>h</i> _i , мм	Температура, К (из [2])	I (К I) _{Н2О}	<i>I</i> (К I) _{Са}	/ (K I) _{Mg}	I (К I) _{Nа}	/ (K I) _{Li}
10	4800	7,15	33,43	41,90	56,31	179,02
12,5	5300	11,35	18,87	24,06	25,94	70,73
15	6000	26,27	28,26	29,53	29,82	39,54
17,5	6000	26,27	28,26	29,53	29,82	39,54
20	6000	26,27	28,26	29,53	29,82	39,54
22,5	6100	29,39	31,10	32,18	32,42	40,48
25	6000	26,27	28,26	29,53	29,82	39,54

Пример проведения расчетов для индуктивно связанной плазмы с аксиальным наблюдением спектров приведен также в [27].

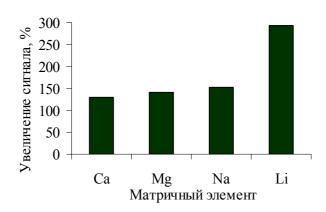


Рис. 6.4. Увеличение интенсивности атомной линии калия в присутствии матричных элементов

6.6. Показатель «жесткости» плазмы

В атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной широко используется показатель «жесткости» плазмы, выражаемый отношением интенсивностей ионной и атомной линий магния [10] (Mg II 280,27 нм и Mg I 285,21 нм). Этот показатель комплексно характеризует эффективность передачи высокочастотного генератора к плазме, время пребывания частиц в плазме разряда, условия атомизации элементов и ионизации их атомов, эффективность возбуждения их спектральных линий, степень нагрузки плазмы аэрозолем и матричный состав образца, вводимого в плазму. «жесткости» плазмы можно также использовать практический аналитический критерий оценки условий возбуждения присутствии спектральных линий В матричных элементов, однозначно связать степень проявления матричного неспектрального эффекта с «жесткостью» плазмы. Во многих опубликованных методиках атомно-эмиссионного анализа С индуктивно связанной первоначально указывается значение показателя «жесткости» плазмы, которое нужно реализовать для реализации данной методики анализа.

Если в результате термодинамического моделирования выбраны оптимальные операционные условия возбуждения спектров. определяющие температурный режим плазмы, то для контроля реализации этих условий рекомендуется одновременно рассчитать и значение показателя «жесткости» плазмы. Для этого при выбранных методом термодинамического определения аналитов моделирования проводится расчет равновесных концентраций атомов и ионов магния в системе, а затем расчет отношения интенсивностей

вышеуказанных ионной и атомной линии магния — т.е. показателя «жесткости» плазмы.

Пример проведения подобных расчетов приведен в [10].

Библиографический список

- Alder J.F. Electronic excitation and ionization temperature measurements in a high frequency inductively coupled argon plasma source and the influence of water vapour on plasma parameters / J.F. Alder, R.M. Bombelka, G.F. Kirkbright // Spectrochimica Acta. Part B. 1980. V. 35. P. 163-175.
- 2. Huang M. Comparison of electron concentrations, electron temperatures, gas kinetic temperatures, and excitation temperatures in argon ICPs operated at 27 and 40 MHz / M. Huang, S.A. Lehn, E.J. Andrews, G.M. Hieftje // Spectrochimica Acta. Part B. 1997. V. 52. P. 1173-1193.
- 3. Kawaguchi H. Axial profiles of excitation and gas temperatures in an inductively coupled plasma / H. Kawaguchi, T. Ito, A. Mizuike // Spectrochimica Acta. Part B. 1981. V. 36, № 7. P. 731-739.
- 4. Haraguchi H. Inductively coupled plasma in analytical atomic spectrometry: excitation mechanisms and analytical feasibilities / H. Haraguchi, T. Hasegawa, M. Abdullah // Pure & Appl. Chem. 1988. V. 60, № 5. P. 685-696.
- 5. Kalnicky D.J. Excitation temperatures and electron number densities experienced by inductively coupled plasmas with and withgout the presence of an easily ionized element / D.J. Kalnicky, V.A. Fassel, R.N. Kniseley // Applied Spectroscopy. 1977. V. 31, № 2. P. 137-150.
- 6. Данилова Д.А. Исследование термохимических процессов и управление ими в методе атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой Дис. ... канд. хим. наук. Екатеринбург: ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет УПИ, 2004. 229 с.
- 7. Ватолин Н.А., Моисеев Г.К., Трусов Б.Г. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных неорганических системах. М.: Металлургия, 1994. 352 с.
- 8. Моисеев Г.К., Вяткин Г.П. Термодинамическое моделирование в неорганических системах. Челябинск: Изд-во Южно-Уральского госуниверситета, 1999. 256 с.
- 9. Моисеев Г.К., Ватолин Н.А., Маршук Л.А., Ильиных Н.И. Температурные зависимости приведенной энергии Гиббса некоторых неорганических веществ. Екатеринбург, 1997. 231 с.
- 10. Пупышев А.А. Данилова Д.А. Разработка модели термохимических процессов для метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Часть І. Матричные неспектральные помехи // Аналитика и контроль. 2001. Т. 5, № 2. С. 112-136.

- 11. Pupyshev A.A., Semenova E.V. Formation of doubly charged atomic ions in the inductively coupled plasma // Spectrochimica Acta. Part B. 2001. V. 56. P.2397-2418.
- 12. Пупышев А.А., Луцак А.К. Возможности термодинамического моделирования термохимических процессов в плазме индуктивно связанного разряда // Аналитика и контроль. 2000. Т. 4, № 4. С. 304-315.
- 13. Пупышев А.А., Семенова Е.В. Образование двухзарядных атомных ионов в плазме индуктивно-связанного разряда // Аналитика и контроль. 2000. Т. 4, № 2. С. 120-140.
- 14. Радциг А.А., Смирнов Б.М. Параметры атомов и атомных ионов. Справочник. М.: Энергоатомиздат, 1986. 344 с.
- 15. Таблицы спектральных линий / А.Н. Зайдель, В.К. Прокофьев, С.М. Райский и др. М.: Наука, 1969. 784 с.
- 16. Atomic Spectra Databases. Version 2.0. National Institute of Standards and Technology (NIST), USA. 1999 (http://www.physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/index.html).
- 17. Корлисс Ч., Бозман У. Вероятности переходов и силы осцилляторов 70 элементов.: М.: Мир, 1968. 562 с.
- 18. De Galan L. The electronic partition functions of atoms and ions betwen 1500 and 7000 K / L. De Galan, R. Smith, J.D. Winefordner // Spectrochimica Acta. Part B. 1968. V. 23B. P. 521-525.
- 19. Tamaki S. The electronic partition functions of atoms and ions betwen 7000 and 12000 K / S. Tamaki, T. Kuroda // Spectrochimica Acta. Part B. 1987. V. 42, № 10. P. 1105-1111.
- 20. Пупышев А.А., Семенова Е.В. Суммы по состояниям двукратно заряженных атомных ионов 35 элементов // Проблемы спектроскопии и спектрометрии: Межвузовский сборник научных трудов № 10. Екатеринбург: УГТУ, 2002. С. 17-20.
- 21. Fagetter B. The electronic partition functions of lanthanide atoms and ions between 1500 and 8000 K / B. Fagetter, G. Heisz, M.W. Blades // Spectrochimica Acta. Part B. 1987. V. 42B, № 11-12. P. 1235-1236.
- 22. Пупышев А.А., Данилова Д.А. Оценка применимости квазиравновесной термодинамической модели для метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой // Проблемы спектроскопии и спектрометрии: Межвузовский сборник научных трудов № 15. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. С. 91- 102.
- 23. Пупышев А.А., Данилова Д.А. Расчетные температурные максимумы интенсивности спектральных линий в индуктивно связанной плазме // Проблемы спектроскопии и спектрометрии: Межвузовский сборник научных трудов № 16. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. С. 45-62.

- 24. Спектральный анализ чистых веществ / Под. ред. Х.И. Зильберштейна.: С.-Пб.: Химия, 1994. 336 с.
- 25. Пупышев А.А., Данилова Д.А. Теоретический выбор внутреннего стандарта для метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой // Проблемы спектроскопии и спектрометрии: Межвузовский сборник научных трудов № 11. Екатеринбург: УГТУ, 2002. С. 69-77.
- 26. Пупышев А.А., Данилова Д.А. Теоретический выбор внутреннего стандарта при определении фосфора и серы методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой // Проблемы спектроскопии и спектрометрии: Межвузовский сборник научных трудов № 17. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. С. 27-32.
- 27. Пупышев А.А., Данилова Д.А. Моделирование сигналов атомной эмиссии элементов при возбуждении спектров в индуктивно связанной плазме и аксиальном ее наблюдении // Проблемы спектроскопии и спектрометрии: Межвузовский сборник научных трудов № 17. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. С. 41-51.

Приложение 1 Комплекты термодинамических свойств атомов и ионов

Атом							ал/(моль	<u>омов и ис</u> .∙К)		DH,	Литера-
или ион	$T_{\rm min}$, K	T_{max} , K	Ψ1	φ ₂	φ3	Ψ4	φ ₅	φ ₆	φ ₇	кал/моль	тура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ag⁺	1500	7000	37,797	0	0	0	43,099	-56,957	31,038	242808	12
Ag	5000	12000	42,588	0	0	0	17,168	-10,123	2,885	242808	12
Al ²⁺	2500	6000	35,818	0	0	0	3,792	-0,467	0,025	650300	*
AI	6000	12000	39,715	0	0	0	1,744	-0,100	0,003	650300	*
Ar ²⁺	2500	6000	38,876	0	0	0	4,140	-0,518	0,028	1000500	*
Al	6000	12000	43,238	0	0	0	1,833	-0,103	0,003	1000500	*
As ⁰	298	2400	53,97	4,920	0,00001	-0,0019	0,302	0	0	67519	9
AS	2400	6000	54,175	5,064	0	0,0155	0	0	0	67519	9
As ²⁺	2500	6000	38,149	0	0	0	4,529	-0,559	0,029	724400	*
AS	6000	12000	42,910	0	0	0	2,058	-0,122	0,003	724400	*
Au ⁰	298	3000	54,377	4,460	0,00017	-0,0245	2,401	0	0	86239	9
Au	3000	6000	54,377	4,460	0,00021	-0,0246	2,400	0	0	86239	9
Au⁺	1500	7000	39,776	0	0	0	41,457	-53,554	31,263	300945	12

									Продол	жение прилс	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Au⁺	5000	9000	44,571	0	0	0	14,248	-2,615	0,111	300945	12
B ²⁺	2500	6000	33,093	0	0	0	3,792	-0,467	0,025	904500	*
В	6000	12000	21,442	0	0	0	8,776	-1,132	0,052	904500	*
Ba ²⁺	2500	12000	42,819	0	0	0	16,425	-6,034	0	393800	13
Be ²⁺	2500	12000	34,704	0	0	0	16,426	-6,803	0	711300	13
Bi⁺	1500	7000	39,906	0	0	0	41,774	-54,040	30,909	217937	12
Br ⁰	1500	7000	37,797	0	0	0	43,099	-56,957	31,038	242808	12
ы	5000	12000	42,588	0	0	0	17,168	-10,123	2,885	242808	12
Br⁺	2400	5000	40,101	0	0	0	44,775	-60,577	36,267	299702	12
ы	5000	1200	44,188	0	0	0	20,862	-12,582	3,296	299702	12
Br ²⁺	2500	6000	40,460	0	0	0	3,772	-0,466	0,026	804000	*
ы	6000	12000	44,474	0	0	0	1,632	-0,078	0,002	804000	*
C ²⁺	2500	6000	32,022	0	0	0	3,797	-0,468	0,025	991540	*
	6000	12000	35,881	0	0	0	1,764	-0,103	0,003	991540	*
Ca ²⁺	2500	12000	39,151	0	0	0	16,424	-6,033	0	457100	13
Ce ²⁺	2500	12000	47.366	0	0	0	24.142	-9.241	0	476600	13
CI ⁰	2400	5000	37,603	0	0	0	45,119	-63,831	39,014	27492,9	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cl ⁰	5000	12000	41,935	0	0	0	19,583	-12,209	3,281	27492,9	12
	2400	5000	38,260	0	0	0	45,626	-64,604	39,801	329184	12
CI ⁺	5000	12000	42,638	0	0	0	19,656	-11,795	3,094	329184	12
Cl ²⁺	2500	6000	37,993	0	0	0	3,810	-0,475	0,026	877700	*
Ci	6000	12000	42,184	0	0	0	1,600	-0,078	0,002	877700	*
Co ²⁺	2500	6000	41,616	0	0	0	4,384	-0,560	0,031	676700	*
Co	6000	12000	46,483	0	0	0	1,809	-0,096	0,002	676700	*
Cr ²⁺	2500	6000	39,288	0	0	0	3,605	-0,416	0,022	630900	*
Ci	6000	12000	42,373	0	0	0	1,903	-0,098	0,002	630900	*
Cu ²⁺	2500	12000	44,210	0	0	0	17,651	-6,577	0	726500	13
Dy ⁰	2500	12000	46,819	0	0	0	25,059	-7,223	0	70071	13
Dy ²⁺	2500	12000	47,848	0	0	0	21,611	-7,127	0	475800	13
Er⁺	2500	12000	48,367	0	0	0	21,776	-6,550	0	216620	13
Er ²⁺	2500	12000	47,993	0	0	0	18,492	-5,527	0	491600	13
Eu ²⁺	2500	12000	47,660	0	0	0	14,523	-4,008	0	432800	13
F ⁰	2400	5000	36,058	0	0	0	44,058	-62,106	37,896	17414,5	12
•	5000	12000	40,286	0	0	0	19,158	-11,817	3,145	17414,5	12

		1					1		продол	жение прилс	771(0117171 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F ⁺	2400	5000	36,753	0	0	0	44,552	-63,099	38,701	420706	12
1	5000	12000	41,091	0	0	0	19,021	-11,576	3,088	420706	12
F ²⁺	2500	6000	40,861	0	0	0	3,875	-0,456	0,024	1227100	*
1	6000	12000	44,624	0	0	0	1,908	-0,106	0,003	1227100	*
Fe ²⁺	2500	6000	37,264	0	0	0	4,695	-0,599	0,034	654400	*
16	6000	12000	42,110	0	0	0	2,022	-0,101	0,002	654400	*
Ga ²⁺	2500	6000	38,638	0	0	0	3,797	-0,468	0,025	676400	*
Ga	6000	12000	42,552	0	0	0	1,740	-0,100	0,002	676400	*
Gd ²⁺	2500	12000	49,110	0	0	0	21,099	-7,972	0	517000	13
Ge ²⁺	2500	6000	37,377	0	0	0	3,800	-0,469	0,025	639600	*
Ge	6000	12000	41,277	0	0	0	1,748	-0,101	0,003	639600	*
Ho ⁰	2500	12000	46,985	0	0	0	24,254	-8,015	0	72235	13
Ho ²⁺	2500	12000	48,775	0	0	0	16,707	-3,887	0	483200	13
I ⁺	1500	7000	41,539	0	0	0	42,265	-53,561	29,016	266524	12
1	5000	12000	45,316	0	0	0	20,463	-12,135	3,173	266524	12
K ²⁺	2500	6000	37,385	0	0	0	4,174	-0,529	0,028	850960	*
IX	6000	12000	41,816	0	0	0	1,830	-0,107	0,003	850960	*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	тение прило. 11	12
'											*
Kr ²⁺	2500	6000	36,665	0	0	0	4,064	-0,507	0,027	884800	
	6000	12000	40,924	0	0	0	1,822	-0,106	0,003	884800	*
La ²⁺	2500	12000	45,823	0	0	0	19,929	-7,323	0	486400	13
Li ²⁺	2500	6000	31,773	0	0	0	3,791	-0,467	0,025	1906340	*
	6000	12000	35,677	0	0	0	1,740	-0,100	0,002	1906340	*
Lu ⁰	2500	12000	46,592	0	0	0	18,763	-5,759	0	102435	13
Lu⁺	2500	12000	41,971	0	0	0	20,217	-5,862	0	227600	13
Lu ²⁺	2500	12000	44,063	0	0	0	20,873	-7,600	0	548000	13
Mg ²⁺	2500	12000	37,660	0	0	0	16,425	-6,034	0	557900	13
Mn ²⁺	2500	6000	40,073	0	0	0	3,833	-0,479	0,026	599840	*
IVIII	6000	12000	44,808	0	0	0	1,448	-0,069	0,002	599840	*
Mo ²⁺	2500	6000	35,818	0	0	0	3,792	-0,467	0,025	692700	*
IVIO	6000	12000	39,715	0	0	0	1,744	-0,100	0,003	692700	*
N ²⁺	2500	6000	35,692	0	0	0	3,931	-0,490	0,026	1130300	*
IN	6000	12000	39,787	0	0	0	1,771	-0,102	0,003	1130300	*
Na ²⁺	2500	6000	31,773	0	0	0	3,791	-0,467	0,025	1234740	*
INa	6000	12000	35,677	0	0	0	1,740	-0,100	0,002	1234740	*

			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1				тродоли	испис прило	MOTIVIZE I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nd^{+}	2500	12000	47,675	0	0	0	27,727	-9,843	0	204900	13
Nd ²⁺	2500	12000	48,148	0	0	0	20,500	-7,260	0	452200	13
Ne ²⁺	2500	6000	37,156	0	0	0	4,073	-0,512	0,027	1444700	*
INC	6000	12000	41,507	0	0	0	1,785	-0,102	0,003	1444700	*
Ni ²⁺	2500	6000	40,977	0	0	0	4,349	-0,548	0,030	696700	*
INI	6000	12000	45,632	0	0	0	1,891	-0,107	0,003	696700	*
O ²⁺	2500	6000	36,646	0	0	0	4,019	-0,504	0,027	1182850	*
	6000	12000	40,936	0	0	0	1,760	-0,099	0,002	1182850	*
Os ⁰	1500	7000	43,518	0	0	0	45,431	-52,006	27,023	187390	12
Os⁺	1500	7000	44,100	0	0	0	42,042	-47,192	30,051	384871	12
Po	2400	5000	37,231	0	0	0	41,243	-56,150	35,242	74140,4	12
Г	5000	12000	40,697	0	0	0	19,762	-10,793	2,783	74140,4	12
P⁺	2400	5000	37,772	0	0	0	46,038	-64,929	39,939	317460	12
	5000	12000	42,124	0	0	0	20,176	-12,227	3,223	317460	12
P ²⁺	2500	6000	38,638	0	0	0	3,797	-0,468	0,025	772900	*
F	6000	12000	42,552	0	0	0	1,740	-0,100	0,002	772900	*
Pb ²⁺	2500	12000	44,047	0	0	0	16,413	-6,023	0	564500	13

			ı ı				1	i e	продоли	ление прило	/ICTIVI/I I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pd⁺	1500	7000	41,132	0	0	0	44,701	-57,721	31,091	281278	12
Pm ⁰	2500	12000	47,756	0	0	0	22,222	-7,933	0	79205	13
Pm⁺	2500	12000	48,588	0	0	0	22,358	-8,223	0	207300	13
Pm ²⁺	2500	12000	47,886	0	0	0	20,649	-7,496	0	458600	13
Pr ²⁺	2500	12000	47,438	0	0	0	22,114	-7,414	0	453600	13
Pt⁺	1500	7000	43,025	0	0	0	42,953	-49,807	25,773	341116	12
Fl	5000	9000	46,235	0	0	0	24,796	-15,856	4,859	341116	12
Re ⁰	1500	7000	43,298	0	0	0	39,994	-49,607	29,852	183919	12
Rh ⁰	1500	7000	41,695	0	0	0	51,028	-64,783	34,764	131526	12
Rh⁺	1500	7000	41,618	0	0	0	47,617	-61,885	35,191	305107	12
Ru ⁰	1500	7000	42,490	0	0	0	45,402	-45,523	24,553	155500	12
Ru⁺	1500	7000	41,911	0	0	0	48,619	-61,167	33,278	326881	12
S°	2400	5000	38,297	0	0	0	44,238	-61,711	37,785	64649,7	12
J	5000	12000	42,378	0	0	0	19,951	-12,175	3,261	64649,7	12
S ⁺	2400	5000	37,231	0	0	0	42,438	-59,650	37,425	304027	12
S	5000	12000	41,360	0	0	0	17,676	-9,082	2,200	304027	12
S ²⁺	2500	6000	37,810	0	0	0	4,330	-0,550	0,030	842200	*

		1	 					1	тродоли	кение прило	/ICTIVIZI I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S ²⁺	6000	12000	42,412	0	0	0	1,880	-0,106	0,003	842200	*
Sb⁺	1500	7000	37,002	0	0	0	54,196	-66,258	33,774	263471	12
Sc ²⁺	2500	6000	37,078	0	0	0	3,792	-0,467	0,025	536700	*
30	6000	12000	40,994	0	0	0	1,736	-0,099	0,002	536700	*
Se ²⁺	2500	6000	42,032	0	0	0	3,768	-0,461	0,025	768000	*
36	6000	12000	45,874	0	0	0	1,736	-0,096	0,002	768000	*
Si ²⁺	2500	6000	34,561	0	0	0	3,791	-0,467	0,025	671800	*
OI .	6000	12000	38,417	0	0	0	1,762	-0,103	0,003	671800	*
Sm ²⁺	2500	12000	47,665	0	0	0	20,895	-7,858	0	434500	13
Sr ²⁺	2500	12000	41,481	0	0	0	16,424	-6,033	0	424200	13
Tb ²⁺	2500	12000	47,608	0	0	0	23,530	-8,249	0	494000	13
Ti ²⁺	2500	6000	41,575	0	0	0	3,983	-0,489	0,026	582930	*
11	6000	12000	45,594	0	0	0	1,841	-0,101	0,002	582930	*
Tm ⁰	2500	12000	46,524	0	0	0	18,849	-3,623	0	55787	13
Tm ²⁺	2500	12000	47,755	0	0	0	15,176	-3,765	0	476200	13
V ²⁺	2500	6000	39,118	0	0	0	3,592	-0,413	0,022	615600	*
V	6000	12000	42,208	0	0	0	1,895	-0,097	0,002	615600	*

Окончание приложения 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Yb ²⁺	2500	12000	44,115	0	0	0	13,619	-3,078	0	461800	13
Zn ²⁺	2500	6000	37,078	0	0	0	3,792	-0,467	0,025	661970	*
Δ11	6000	12000	40,994	0	0	0	1,736	-0,099	0,002	661970	*

Примечание: * — расчеты выполнены на кафедре физико-химических методов анализа ГОУ ВПО УГТУ-УПИ.

Приложение 2

Значения коэффициентов аппроксимации температурной зависимости Z(T)

Эле-		<u> </u>	·	оициенты О	<u> зависимости</u>	_(- (-)	T .	T	Лите-
мент	а	b	С	d	е	f	τ _{min} , Κ	τ _{max} , Κ	ратура
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ac ⁰	2,8150	1,6044	-0,32551	0,070008	-0,0036227	0	1500	7000	18
Ac ⁺	1,6501	-1,0667	0,52893	-0,051356	0,0020866	0	1500	7000	18
Ag ⁰	2,0158	-0,011712	0,0018709	0	0	0	1500	7000	18
Ag	6,5616	-1,1810	0,077292	0	0	0	6929	12444	19
Ag⁺	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
Ag	1,2198	-0,069130	0,0051919	0	0	0	5250	12155	19
Al ⁰	5,2955	0,27833	-0,047529	0,0030199	0	0	1500	7000	18
AI	12,906	-2,0223	0,14928	0	0	0	6964	10290	19
$AI^{\scriptscriptstyle +}$	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
AI	1,1005	-0,035789	0,0029986	0	0	0	4500	12060	19
Al ²⁺	2,0000	0	0	0	0	0	2500	12000	20
Ar ⁰	1,0000	0	0	0	0	0	3750	12216	19
Ar ⁺	5,0313	0,080383	-0,0021925	0	0	0	6750	14863	19
Ar ²⁺	3,245	3,183	-1,085	0,213	-0,022	0,001	2500	6000	20

	I I					Прод	л і <u>жение</u>	1107131071	0117171 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ar ²⁺	4,159	1,584	-0,277	0,028	-0,001	0	6000	12000	20
As ⁰	4,2641	-0,27507	0,075632	-0,0023876	0	0	1500	7000	18
Α3	3,4981	0,067896	0,025553	0	0	0	5000	9000	19
As ⁺	-0,25384	2,2840	-0,33383	0,030408	-0,0011609	0	1500	7000	18
AS	1,6134	1,0640	-0,041618	0	0	0	5000	9000	19
As ²⁺	-1,159	3,845	-1,647	0,401	-0,049	0,002	2500	6000	20
AS	0,669	1,131	-0,156	0,013	-0,001	0	6000	12000	20
Au ⁰	2,2056	-0,23937	0,076490	-0,0038320	0	0	1500	7000	18
Au	0,96792	0,31342	-0,0040428	0	0	0	5000	9000	19
Au⁺	1,0546	-0,040809	0,0028439	0,0016586	0	0	1500	7000	18
Au	1,5969	-0,28191	0,037825	0	0	0	5000	9000	19
B ⁰	5,9351	0,010438	0	0	0	0	1500	7000	18
B ⁺	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
B ²⁺	2,0000	0	0	0	0	0	2500	6000	20
Б	5,925	-2,378	0,567	-0,067	0,004	-0,0001	6000	12000	20
Ba ⁰	1,2869	-0,27064	0,029301	0,021825	-0,0014227	0	1500	7000	18
Ба	16,006	-4,8168	0,47490	0	0	0	6964	10290	19

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	тродо) IWEUNE	TIPVITION	C117171 Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ba⁺	2,5399	-0,95758	0,53003	-0,071694	0,0034154	0	1500	7000	18
Ба	1,5562	0,57097	-0,0026956	0	0	0	6700	12033	19
Be ⁰	0,99130	0,013175	-0,0063713	0,00096537	0	0	1500	7000	18
Be⁺	2,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
Be ²⁺	1,0000	0	0	0	0	0	2500	12000	13
Bi ⁰	3,9804	0,052809	-0,042232	0,011727	-0,00068456	0	1500	7000	18
Bi ⁺	1,0528	-0,044352	0,0069487	0,00078728	0	0	1500	7000	18
	3,7536	0,19395	0,0041647	-0,0010971	0	0	1500	7000	18
Br ⁰	4,5002	0,047192	0,0022647	0	0	0	6685	12005	19
Ы	3,848	2,103	-10,768	23,71	-19,205	5,703	2400	7000	12
	4,88	-5,057	9,291	-4,598	0,879	-0,013	7000	12000	12
	4,4554	0,45510	0,0072400	-0,0014155	0	0	1500	7000	18
Br⁺	4,4042	0,52832	-0,012363	0	0	0	5250	12155	19
Ы	4,527	3,247	8,633	-21,565	22,106	-8,743	2400	7000	12
	4,336	5,542	-1,561	-0,026	0,142	-0,024	7000	12000	12
Br ²⁺	3,173	1,142	-0,603	0,151	-0,018	0,001	2500	6000	20
DI	3,448	0,238	-0,055	0,009	0	0	6000	12000	20

				1		Продо	л жение	TIPVISTON	C117171 Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C ₀	8,6985	0,020485	0,017629	-0,00039091	0	0	1500	7000	18
	8,8798	0,022139	0,011205	0	0	0	6685	12606	19
C ⁺	5,5548	0,18958	-0,033341	0,0020597	0	0	1500	7000	18
O	6,0588	-0,038311	0,0030579	0	0	0	6000	13891	19
C ²⁺	1,0000	0	0	0	0	0	2500	6000	20
O	2,829	-1,073	0,247	-0,028	0,002	0	6000	12000	20
Ca ⁰	1,0007	0,020540	-0,019616	0,0044420	0	0	1500	7000	18
Ca	17,404	-4,6083	0,34326	0	0	0	6876	12348	19
Ca⁺	2,1126	-0,10185	0,020713	0,00064354	0	0	1500	7000	18
Ca	1,3582	0,092776	0,012888	0	0	0	6685	12005	19
Ca ²⁺	1,0000	0	0	0	0	0	2500	12000	13
Cd ⁰	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
Cu	3,0361	-0,52518	0,034178	0	0	0	6841	12286	19
Cd⁺	2,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
Cu	2,0428	-0,015376	0,0012331	0	0	0	4000	12410	19
Ce ⁰	7,8011	1,4065	8,1361	-0,6081	0,1011	-0,0055	1500	8000	21
Ce	-15,255	26,7912	-2,37704	1,44400	-0,1004	0,00222482	2500	12000	13

			T T			Продо	л жение	TIPVISTON	C117171 Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ce⁺	13,5043	-14,7240	17,8475	-2,1319	0,1291	-0,0032	1500	8000	21
Ce	7,005	-8,3156	15,55	-1,73	0,00954856	-0,00211813	2500	12000	13
Ce ²⁺	9,52	-3,0347	4,67187	-0,778354	0,0624637	-0,00205095	2500	6000	13
Ce	-4,829	8,7717	0,74425	-0,118157	0,0064165	-0,00012974	6000	12000	13
	3,8461	0,96051	-0,22542	0,026316	-0,0012008	0	1500	7000	18
CI ⁰	5,6257	-0,011225	0,0025888	0	0	0	6824	12256	19
Ci	3,849	10,207	-27,942	43,935	-36,827	12,743	2400	7000	12
	4,584	4	-6,483	6,204	-3,302	0,762	7000	12000	12
	5,0876	1,7463	-0,41309	0,050727	-0,0023308	0	1500	7000	18
CI⁺	6,9708	0,30834	-0,0052246	0	0	0	5750	12678	19
Ci	4,975	20,419	-61,229	107,344	-95,441	34,036	2400	7000	12
	7,061	2,711	0,109	-0,416	0,075	0,013	7000	12000	12
Cl ²⁺	3,984	0,024	-0,004	-0,004	0,001	0	2500	6000	20
Ci	2,146	1,095	-0,271	0,034	-0,002	0	6000	12000	20
Co ⁰	7,0250	6,9330	-0,43327	0,016702	0,0010166	0	1500	7000	18
CO	73,941	-12,125	1,1086	0	0	0	6929	12444	19
Co⁺	6,4152	4,5806	0,25184	-0,067064	0,0038188	0	1500	7000	18

1	2	3	4	5	6	<u>т род</u> с	8 8	9	10
Co⁺	8,7206	4,4949	-0,070808	0	0	0	4250	12558	19
	6,318	9,197	-2,439	0,38	-0,031	0,001	2500	6000	20
Co ²⁺	14,093	3,11	-0,48	0,055	-0,003	0,0001	6000	12000	20
Cr ⁰	8,1008	-1,4239	0,54376	-0,048687	0,0030023	0	1500	7000	18
Cr	49,842	-13,021	1,1741	0	0	0	6876	10159	19
Cr⁺	5,7658	0,42061	-0,26244	0,061803	-0,0031244	0	1500	7000	18
Ci	9,9904	-2,0561	0,29217	0	0	0	4000	12410	19
Cr ²⁺	1,114	0,661	-0,136	0,004	0,002	0	2500	6000	20
Ci	-0,834	1,576	-0,326	0,035	-0,002	0	6000	12000	20
Cs ⁰	1,9398	0,10627	-0,062648	0,012145	0,00010147	0	1500	7000	18
Cs	10,871	-3,8388	0,43778	0	0	0	5079	6174	19
Cs⁺	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
Cs	1,0000	0	0	0	0	0			19
Cu ^o	2,1905	-0,19380	0,051491	-0,0014419	0	0	1500	7000	18
Cu	3,7239	-0,49475	0,054196	0	0	0	6929	12444	19
Cu⁺	0,95325	0,054446	-0,020179	0,0024160	0	0	1500	7000	18
Cu	1,2942	-0,14679	0,018540	0	0	0	5000	12155	19

	- γ			Υ		продо	лжение	i ipris iome	7117171 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cu ²⁺	5,939	0,1779	0,30796	-0,095179	0,011491	-0,00051278	2500	6000	13
Cu	5,025	1,3534	-0,2358	0,024776	-0,0014096	0,00003318	6000	12000	13
Dy ⁰	15,0835	2,6642	-1,3069	0,3604	0	0	1500	8000	21
Бу	1,356	15,3505	-5,42776	0,927931	-0,0289438	0,00005463	2500	12000	13
Dy⁺	15,9055	8,7037	-2,0395	0,3750	0,0022	-0,0008947	1500	8000	21
Бу	11,814	13,2755	-3,99906	0,785455	-0,0396366	0,00071737	2500	12000	13
Dy ²⁺	17,646	-2,8166	1,74516	-0,236396	0,028433	-0,00143563	2500	6000	13
Dy	-39,223	34,0163	-7,89233	1,065	-0,0652072	0,00152339	6000	12000	13
Er ⁰	13,1758	-0,2926	-0,1141	0,1765	0,0024	0	1500	8000	21
	6,528	5,3508	-1,74304	0,350804	0,0013685	-0,00052129	2500	12000	13
Er⁺	18,2590	3,1786	-0,8387	0,2893	-0,0116	0	1500	8000	21
	19,733	2,0334	-0,57212	0,28163	-0,0151259	0,00027967	2500	12000	13
Er ²⁺	20,879	-10,1233	4,92086	-1,074	0,1195	-0,00512816	2500	6000	13
	12,126	1,1601	-0,33607	0,088765	-0,0051432	0,00009954	6000	12000	13
Eu ⁰	7,6246	0,6951	-0,4167	0,0824	-0,0004223	0	1500	8000	21
⊏u	10,936	-2,5961	0,79059	-0,120761	0,0154201	-0,00045055	2500	12000	13
Eu⁺	6,9612	3,4806	-1,1061	0,2463	-0,0229	-0,0008404	1500	8000	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eu ²⁺	7,18	1,072	-0,54738	0,13697	-0,0169385	0,00084109	2500	6000	13
Lu	4,748	1,6542	-0,28211	0,012957	0,0008254	-0,00003922	6000	12000	13
	4,5832	0,77683	-0,20884	0,026771	-0,0013035	0	1500	7000	18
F ⁰	5,5470	0,055623	-0,0021451	0	0	0	4250	12558	19
'	4,678	7,201	-21,286	35,106	-30,383	10,754	2400	7000	12
	5,311	1,836	-2,655	2,172	-0,95	0,174	7000	12000	12
	6,4670	1,2968	-0,32656	0,039535	-0,0018070	0	1500	7000	18
F ⁺	8,0353	0,10189	-0,000057894	0	0	0	8500	18742	19
'	6,491	13,754	-40,6	66,043	-55,472	19,137	2400	7000	12
	7,846	2,943	-4,836	5,162	-2,556	0,488	7000	12000	12
F ²⁺	4,0000	0	0	0	0	0	2500	6000	20
ı	8,559	-2,604	0,586	-0,065	0,004	-0,0001	6000	12000	20
Fe ⁰	10,658	7,3013	-2,2102	0,45301	-0,040732	0,0015017	1500	7000	18
16	100,37	-21,190	1,7361	0	0	0	6929	12444	19
Fe⁺	7,6314	14,304	-2,5285	0,27466	-0,010992	0	1500	7000	18
16	27,436	2,2556	0,17050	0	0	0	4000	12410	19
Fe ²⁺	2,193	-0,773	0,565	-0,16	0,021	-0,001	2500	6000	20

	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	Продо	лімение	Tipriston	0117171 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fe ²⁺	4,738	-1,57	0,374	-0,043	0,002	-0,0001	6000	12000	20
Ga ⁰	1,7931	1,9338	-0,46430	0,054876	-0,0025054	0	1500	7000	18
Ga	2,3711	0,84502	-0,059079	0	0	0	5000	9000	19
Ga⁺	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
Ga	1,0000	0	0	0	0	0	5000	12000	19
Ga ²⁺	2,0000	0	0	0	0	0	2500	12000	20
Gd⁰	5,9750	16,2554	-4,6555	1,0023	-0,0684	0,0020	1500	8000	21
Gu	9,621	12,1442	-2,89188	0,641021	-0,0314307	0,00051258	2500	12000	13
$Gd^{\scriptscriptstyle{+}}$	7,3830	10,5601	1,3468	-0,1286	0,0112	-0,0003522	1500	8000	21
Gu	10,473	7,5704	2,32041	-0,223833	0,0086567	-0,00012291	2500	12000	13
Gd ²⁺	1,497	16,0117	-2,36176	0,360564	-0,0340171	0,00133371	2500	6000	13
Gu	13,515	7,2537	0,36855	-0,094939	0,0061845	-0,00014173	6000	12000	13
Ge ⁰	0,57739	3,0921	-0,60415	0,068353	-0,00314055	0	1500	7000	18
Ge⁺	1,1759	1,2694	-0,16666	0,0084231	0	0	1500	7000	18
Ge ²⁺	1,0000	0	0	0	0	0	2500	12000	20
H ⁰	2,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
П	2,0235	-0,005687	0,00033363	0	0	0	6824	12256	19

	 					Продс	лжение		СПИЛ Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
He ⁰	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
116	1,0000	0	0	0	0	0	5000	12000	19
He⁺	2,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
116	2,0000	0	0	0	0	0	5000	12000	19
Hf ⁰	4,1758	0,40700	0,57862	-0,072887	0,0036848	0	1500	7000	18
Hf⁺	3,7701	-0,49310	0,76941	-0,083412	0,0037845	0	1500	7000	18
Hg ⁰	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
ng	1,4505	-0,11717	0,0076274	0	0	0	6700	12033	19
IJa ⁺	2,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
Hg⁺	2,0997	-0,035464	0,0029687	0	0	0	4500	12060	19
Ho ⁰	14,5902	2,2345	-1,4541	0,4372	-0,0156	0	1500	8000	21
ПО	18,259	-1,0637	-0,63108	0,449161	-0,03719	0,00097307	2500	12000	13
Ho⁺	19,9010	4,0575	-0,4455	0,0965	-0,0042	0	1500	8000	21
Ho ²⁺	19,631	-5,0623	2,57676	-0,549315	0,0640768	-0,00276911	2500	6000	13
ПО	5,687	7,1669	-1,85751	0,278739	-0,0150034	0,00029562	6000	12000	13
I ⁰	3,9365	0,023645	0,0065893	0	0	0	1500	7000	18
l	4,4328	-0,069130	0,0097102	0	0	0	6700	12033	19

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		Продо	лжение	TIPVISTON	0117171 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
 	5,1623	-0,21833	0,085590	-0,0045646	0	0	1500	7000	18
'	3,9132	0,36218	-0,0039048	0	0	0	4750	12124	19
In ⁰	1,0731	1,1097	-0,13211	0,0063919	0	0	1500	7000	18
111	13,381	-2,6861	0,20733	0	0	0	6964	10290	19
In ⁺	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
111	1,0547	-0,018883	0,0015042	0	0	0	4500	12060	19
Ir ⁰	11,070	-2,4120	1,9388	-0,34389	0,033511	-0,0013376	1500	7000	18
"	-1,7283	4,9438	-0,074275	0	0	0	5000	9000	19
K ⁰	1,9909	0,023169	-0,017423	0,0040938	0	0	1500	7000	18
IX .	27,351	-8,3969	0,72641	0	0	0	6450	8232	19
K ⁺	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
K	1,0000	0	0	0	0	0			19
K ²⁺	3,194	1,105	-0,385	0,092	-0,012	0,001	2500	6000	20
IX .	-4,553	5,267	-1,15	0,127	-0,007	0	6000	12000	20
Kr ⁰	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
IXI	1,0455	-0,010990	0,00065237	0	0	0	6824	12256	19
Kr⁺	3,9555	-0,011428	0,033880	-0,0025583	0	0	1500	7000	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kr ⁺	3,7664	0,15500	-0,0040070	0	0	0	6000	13891	19
Kr ²⁺	6,806	-2,471	1,292	-0,293	0,033	-0,001	2500	6000	20
IXI	7,514	-1,482	0,421	-0,048	0,003	-0,0001	6000	12000	20
La ⁰	2,0546	2,9457	0,39142	-0,014788	0,0015460	0	1500	7000	18
La	-0,978	5,9872	-0,70331	0,150049	-0,0052441	0,00002598	2500	12000	13
La⁺	-1,0728	10,191	-1,3894	0,13912	-0,0049009	0	1500	7000	18
La	-1,93	11,1466	-1,77422	0,213154	-0,0117591	0,00025346	2500	12000	13
La ²⁺	2,46	2,5542	-0,62387	0,134725	-0,0146406	0,00061547	2500	12000	13
La	5,65	0,0174	0,263	-0,03153	0,0015917	-0,00003016	6000	12000	13
Li ⁰	2,0810	-0,068926	0,014081	0	0	0	1500	7000	18
LI	15,171	-3,5744	0,25279	0	0	0	6964	10290	19
Li ⁺	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
L1	1,0000	0	0	0	0	0			19
Li ²⁺	2,00	0	0	0	0	0	2500	12000	20
Lu ⁰	2,9553	1,2346	0,1398	-0,0730	0,0105	-0,0004154	1500	8000	21
Lu	1,358	2,9598	-0,56857	0,066532	-0,0026409	0,00003183	2500	12000	13
Lu⁺	0,8525	0,2597	-0,1631	0,0424	-0,0038	0,0001273	1500	8000	21

		<u> </u>				Продо	<u> пжение</u>	TIPVISTOR	C117171 Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lu⁺	1,399	-0,2942	0,04853	0,003913	-0,0004263	0,0000127	2500	12000	13
Lu ²⁺	2,43	-0,6777	0,32551	-0,044371	0,0031468	-0,00010256	2500	6000	13
Lu	4,807	-2,0065	0,60726	-0,070889	0,0039679	-0,00008748	6000	12000	13
Mg⁰	0,99101	0,013474	-0,0064659	0,00097446	0	0	1500	7000	18
ivig	7,2783	-1,6363	0,10932	0	0	0	6926	12444	19
Mg ⁺	2,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
ivig	2,0617	-0,024424	0,0022113	0	0	0	3750	12216	19
Mg ²⁺	1,0000	0	0	0	0	0	2500	12000	13
Mn ⁰	5,7492	0,36614	-0,17998	0,031845	0,00099149	0	1500	7000	18
IVIII	22,945	-6,9643	0,78764	0	0	0	5000	9000	19
Mn⁺	6,9764	0,095512	-0,090924	0,027782	-0,0014948	0	1500	7000	18
IVIII	5,7373	0,15612	0,046990	0	0	0	5000	9000	19
Mn ²⁺	5,995	-0,066	0,071	-0,027	0,004	0	2500	6000	20
IVIII	4,858	0,751	-0,183	0,019	-0,001	0	6000	12000	20
Mo ⁰	6,3987	0,89208	-0,46701	0,093518	-0,0031992	0	1500	7000	18
IVIO	27,393	-7,7998	0,86252	0	0	0	6929	10238	19
Mo ⁺	5,6000	0,70382	-0,41915	0,090921	-0,0037829	0	1500	7000	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mo⁺	5,4235	-1,5131	0,35556	0	0	0	8000	12410	19
Mo ²⁺	1,696	-1,114	0,733	-0,186	0,022	-0,001	2500	6000	20
IVIO	-2,601	2,371	-0,532	0,065	-0,004	0,0001	6000	12000	20
N^0	3,9914	0,017491	-0,010148	0,0017138	0	0	1500	7000	18
IN	3,8867	-0,044140	0,012776	0	0	0	7000	12570	19
N ⁺	7,3929	0,88536	-0,23679	0,030756	-0,0014524	0	1500	7000	18
14	8,1160	0,12966	0,00050004	0	0	0	7250	15986	19
N ²⁺	3,299	2,548	-1,128	0,257	-0,029	0,001	2500	6000	20
IN	3,976	1,051	-0,243	0,029	-0,002	0	6000	12000	20
Na ⁰	2,0078	0,0023147	-0,0063878	0,0015002	0	0	1500	7000	18
INA	14,477	-3,7354	0,29025	0	0	0	6964	10290	19
Na⁺	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
INA	1,0000	0	0	0	0	0	7000	12000	19
Na ²⁺	2,659	1,982	-0,693	0,134	-0,013	0,001	2500	6000	20
ING	0,223	2,713	-0,574	0,062	-0,003	0,0001	6000	12000	20
Nb ⁰	-2,7815	24,215	-7,1137	1,4186	-0,12606	0,0044289	1500	7000	18
IND	26,792	0,59668	0,92795	0	0	0	5000	9000	19

			1			продо	лжение	HOM	C117171 Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nb⁺	1,0219	10,405	-1,2338	0,22748	-0,012293	0	1500	7000	18
IND	-9,6165	11,085	-0,12334	0	0	0	5000	9000	19
Nd ⁰	-1,1347	18,3341	-8,0333	2,0424	-0,0887	0	1500	8000	21
ING	-11,651	28,9235	-11,03	2,591	-0,1599	0,00340561	2500	12000	13
Nd⁺	4,9385	11,3564	-1,1460	0,8744	-0,0425	0	1500	8000	21
ING	12,847	4,965	0,49624	0,778404	-0,0562498	0,00129262	2500	12000	13
Nd ²⁺	2,505	8,5374	-0,39779	-0,075293	0,015453	-0,00071787	2500	6000	13
ING	-3,061	13,5955	-2,21934	0,248473	-0,0128961	0,00025946	6000	12000	13
Ne ⁰	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
INC	1,0000	0	0	0	0	0			19
Ne⁺	4,2068	0,64814	-0,10458	0,0061122	0	0	1500	7000	18
ive	5,6040	0,022598	-0,00041499	0	0	0	10250	22601	19
Ne ²⁺	5,765	1,028	-0,042	-0,048	0,01	-0,001	2500	6000	20
INC	12,343	-2,737	0,692	-0,082	0,005	0	6000	12000	20
Ni ⁰	8,9954	9,8924	-1,8785	0,19243	-0,0074831	0	1500	7000	18
INI	58,508	-7,6721	0,61106	0	0	0	6929	12444	19
Ni⁺	5,7188	0,95002	-0,13666	0,044294	-0,0028500	0	1500	7000	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ni⁺	3,4072	1,3931	0,020558	0	0	0	4500	12060	19
Ni ²⁺	-8,433	23,526	-10,365	2,406	-0,278	0,013	2500	6000	20
INI	12,331	0,815	0,029	-0,007	0	0	6000	12000	20
O_0	7,6413	0,74904	-0,20133	0,026166	-0,0012265	0	1500	7000	18
	8,3973	0,072856	0,0029215	0	0	0	6824	12256	19
O⁺	4,0232	-0,017252	0,0027561	0	0	0	1500	7000	18
O	3,6317	0,017232	0,0045272	0	0	0	8750	19293	19
O ²⁺	5,417	2,094	-0,626	0,098	-0,007	0	2500	6000	20
	9,307	-0,861	0,275	-0,038	0,003	-0,0001	6000	12000	20
Os ⁰	8,6643	-0,32516	0,68181	-0,044252	0,0019975	0	1500	7000	18
Os ⁺	9,7086	-0,38140	0,65292	-0,064984	0,0028792	0	1500	7000	18
	4,2251	-0,22476	0,057306	-0,0010381	0	0	1500	7000	18
P^0	3,8940	-0,076124	0,035558	0	0	0	5000	9000	19
'	3,904	2,04	-14,904	44,612	-46,374	17,394	2400	7000	12
	5,496	-10,13	23,625	-18,234	6,109	-0,439	7000	12000	12
P⁺	4,4151	2,2494	-0,55371	0,071913	-0,0035156	0	1500	7000	18
'	3,5860	1,4547	-0,091980	0	0	0	5000	9000	19

				Υ		<u> b o ⊟ o</u> .	JIMCHIIC		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P ⁺	4,559	23,304	-69,816	127,005	-117,731	43,555	2400	7000	12
	6,591	4,663	-0,905	-0,723	0,538	-0,093	7000	12000	12
P ²⁺	2,748	1,618	-0,439	0,067	-0,006	0	2500	6000	20
	13,86	-5,15	1,219	-0,139	0,008	0	6000	12000	20
Pb ⁰	1,2430	-0,27549	0,088724	-0,0042056	0	0	1500	7000	18
FD	10,604	-2,4407	0,18072	0	0	0	6929	12444	19
Pb⁺	2,0663	-0,055909	0,011277	0	0	0	1500	7000	18
PD	1,8719	0,021753	0,0043310	0	0	0	3750	12216	19
Pb ²⁺	1,0000	0	0	0	0	0	2500	12000	13
Pd ⁰	1,4811	-0,67500	0,26930	-0,015213	0	0	1500	7000	18
Pd⁺	5,7306	0,11960	0,12969	-0,023613	0,0013441	0	1500	7000	18
Pm ⁰	5,8296	1,0052	3,6891	-0,9673	0,1140	-0,0045	1500	8000	21
PIII	-3,42	11,7301	-1,18307	0,127642	-0,0050883	0,00005397	2500	12000	13
Pm⁺	5,0631	2,1378	5,4968	-0,7121	0,0334	0	1500	8000	21
FIII	-8,91	19,6717	-1,93216	0,175729	-0,0070632	0,00009167	2500	12000	13
Pm ²⁺	-8,029	12,3151	0,7916	-0,844778	0,1385	-0,00717971	2500	6000	13
FIII	-151,406	104,5	-24,02	2,81	-0,163	0,00375263	6000	12000	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Po ⁰	5,0023	-0,014898	0,0068170	0,00039411	0	0	1500	7000	18
Pr ⁰	5,2754	10,3983	-6,1586	2,6715	-0,2427	0,0077	1500	8000	21
Pr⁺	10,2006	6,3863	-0,0177	1,4075	-0,1819	0,0073	1500	8000	21
1 1	32,359	-21,1948	13,17	-1,466	0,0750674	-0,00152391	2500	12000	13
Pr ²⁺	1,125	11,6785	-2,82804	0,513408	-0,033499	0,00071809	2500	6000	13
1 1	24,785	-4,1093	1,25832	0,007423	-0,0042782	0,00012383	6000	12000	13
Pt ⁰	5,2171	8,6683	-2,8182	0,55124	-0,054166	0,0021168	1500	7000	18
1 (19,971	-0,89169	0,17621	0	0	0	5000	9000	19
Pt⁺	6,5712	-1,0363	0,57234	-0,061219	0,0026878	0	1500	7000	18
1 (5,1914	0,47131	0,088186	0	0	0	5000	9000	19
Ra ⁰	0,79239	0,32001	-0,17242	0,036107	-0,0018939	0	1500	7000	18
Ra⁺	2,1669	-0,15014	0,033156	0	0	0	1500	7000	18
Rb ⁰	1,9869	0,038500	-0,028329	0,0061101	0	0	1500	7000	18
IND	53,941	-15,231	1,1609	0	0	0	6772	8232	19
Rb⁺	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
IND	1,0000	0	0	0	0	0	7000	12000	19
Re ⁰	5,5671	0,72721	-0,42096	0,090750	-0,0039331	0	1500	7000	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Re ⁰	8,0420	-1,6690	0,31349	0	0	0	5000	9000	19
Re⁺	6,5699	0,59999	-0,28532	0,050724	-0,0018544	0	1500	7000	18
116	10,311	-1,6779	0,22798	0	0	0	5000	9000	19
Rh ⁰	6,9164	3,8468	0,043125	-0,0087907	0,00059589	0	1500	7000	18
Rh⁺	7,2902	1,7476	-0,038257	0,0020140	0,00021218	0	1500	7000	18
Rn ⁰	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
Rn⁺	4,0000	0	0	0	0		1500	7000	18
Ru ⁰	7,2113	7,0168	-1,6028	0,43173	-0,044164	0,0017278	1500	7000	18
Ru⁺	7,2138	4,2834	-0,60479	0,11008	-0,0056846	0	1500	7000	18
	6,3025	1,2760	-0,31216	0,042862	-0,0021798	0	1500	7000	18
S ⁰	8,4502	0,058682	0,011417	0	0	0	6700	12033	19
3	6,344	13,763	-42,29	81,6	-78,115	29,403	2400	7000	12
	7,776	0,979	4,275	-4,118	1,072	0,176	7000	12000	12
	4,0754	-0,062564	0,0093599	0,0012001	0	0	1500	7000	18
S ⁺	3,1808	0,14278	0,0076889	0	0	0	5750	12678	19
3	3,848	2,103	-10,768	23,71	-19,205	5,703	2400	7000	12
	4,88	-5,057	9,291	-4,598	0,879	-0,013	7000	12000	12

	<u> </u>		1		ı	Прод) IWEUNE	1107131071	<u> </u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S ²⁺	2,361	3,105	-0,782	0,102	-0,005	0	2500	6000	20
3	5,583	0,473	0,025	-0,009	0,001	0	6000	12000	20
Sb ⁰	4,3114	-0,35581	0,11172	-0,0044909	-0,000044389	0	1500	7000	18
Sb⁺	0,91346	-0,15093	0,27036	-0,037073	0,0017249	0	1500	7000	18
Sc ⁰	7,5269	1,9781	-0,83425	0,16172	-0,0079095	0	1500	7000	18
Sc ⁺	11,624	1,1329	0,49827	-0,073723	0,0035934	0	1500	7000	18
Sc ²⁺	10,093	-1,713	1,109	-0,301	0,038	-0,002	2500	6000	20
30	12,267	-1,819	0,478	-0,059	0,004	-0,0001	6000	12000	20
Se ⁰	4,3532	0,88150	-0,063171	0,0025242	0	0	1500	7000	18
Se⁺	4,1786	-0,15392	0,032053	0	0	0	1500	7000	18
Se ²⁺	9,178	-0,118	0,005	0,009	-0,002	0	2500	6000	20
36	10,941	-1,22	0,288	-0,031	0,002	0	6000	12000	20
Si ⁰	6,7868	0,86319	-0,11622	0,013109	-0,00062013	0	1500	7000	18
OI .	22,124	-3,2624	0,22473	0	0	0	6841	12286	19
Si ⁺	3,9839	1,0330	-0,25689	0,030743	-0,0014190	0	1500	7000	18
Si	5,4015	0,055897	-0,00087074	0	0	0	4000	12410	19
Sm ⁰	-5,5519	13,2757	-2,8727	0,3076	0,0275	-0,0024	1500	8000	21

						Продо	и жение	TIPITION	C117171 Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sm ⁰	-15,87	24,212	-7,10447	1,15	-0,0612906	0,00116763	2500	12000	13
Sm⁺	-3,9213	12,4250	-0,7073	0,1704	-0,0043	0	1500	8000	21
SIII	-0,656	11,5113	-0,15664	0,152625	-0,015816	0,00047417	2500	12000	13
Sm ²⁺	-3,247	9,248	-0,72793	-0,028398	0,0089515	-0,00041026	2500	6000	13
SIII	-11,475	14,9402	-2,3583	0,21409	-0,0097168	0,0001801	6000	12000	13
Sn ⁰	-0,19638	1,4075	-0,076152	0,0015788	0	0	1500	7000	18
SII	0,30386	1,1828	-0,043208	0	0	0	5000	9000	19
Sn⁺	2,0009	-0,20414	0,20687	-0,032011	0,0016436	0	1500	7000	18
311	2,9060	-0,063973	0,024764	0	0	0	5000	9000	19
Sr ⁰	0,87127	0,20148	-0,10746	0,021424	-0,0010231	0	1500	7000	18
SI	11,651	-3,3006	0,27823	0	0	0	6964	10290	19
Sr ⁺	1,9355	0,095844	-0,050332	0,010363	-0,00048526	0	1500	7000	18
SI	1,7712	-0,022881	0,019160	0	0	0	6685	12005	19
Ta ⁰	3,0679	0,81776	0,34936	0,0074861	0,00030739	0	1500	7000	18
la	7,6848	-1,1255	0,60013	0	0	0	5000	9000	19
Ta⁺	1,6834	2,0103	0,56443	-0,031036	0,00089565	0	1500	7000	18
Id	-2,2029	4,0460	0,17954	0	0	0	5000	9000	19

	 			1		Продо	23 171CT 171C	прилож	0117171 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tb ⁰	23,3855	18,8008	-0,3665	0,5702	-0,0229	0	1500	8000	21
Tb⁺	15,7730	-0,6403	6,1190	-0,6973	0,0300	0	1500	8000	21
Tb ²⁺	17,544	-2,6646	1,77837	-0,085433	0,0058192	-0,00040986	2500	6000	13
10	32,032	-11,6457	3,85302	-0,288194	0,0110289	-0,000184	6000	12000	13
Tc ⁰	4,4388	-0,30648	1,6525	-0,40779	0,048401	-0,0021538	1500	7000	18
Tc⁺	8,1096	-2,9630	2,3690	-0,50200	0,0049656	-0,0019087	1500	7000	18
Te ⁰	5,1239	-0,29839	0,19304	-0,022031	0,00089622	0	1500	7000	18
Te⁺	4,2555	-0,25894	0,069390	-0,0024271	0	0	1500	7000	18
Ti ⁰	14,643	2,0096	-0,35619	0,14750	-0,0071902	0	1500	7000	18
""	23,138	-3,2389	0,90184	0	0	0	6876	12348	19
Ti ⁺	9,2912	23,978	-7,3970	1,4602	-0,14208	0,0054322	1500	7000	18
11	32,435	4,1960	0,046027	0	0	0	6824	12256	19
Ti ²⁺	8,027	10,504	-4,402	0,99	-0,11	0,005	2500	6000	20
11	14,535	2,00	-0,298	0,039	-0,002	0,0001	6000	12000	20
TI ⁰	2,1277	-0,16754	0,063187	-0,0035945	0	0	1500	7000	18
TI⁺	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
Tm ⁰	7,9400	-0,0049	0,1044	-0,0767	0,0191	-0,0007508	1500	8000	21

4	0	2	4	_	0	•	<u>ліжение</u>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tm ⁰	6,116	1,9055	-0,6558	0,06718	0,0061707	-0,00030405	2500	12000	13
Tm⁺	12,9226	1,7210	-0,5073	0,0717	0	0	1500	8000	21
1111	10,499	4,3131	-1,52585	0,253476	-0,0138547	0,00026668	2500	12000	13
Tm ²⁺	9,098	-1,3346	0,59668	-0,120592	0,0121197	-0,00041019	2500	6000	13
1111	-4,47	7,3477	-1,65719	0,177886	-0,0080759	0,00014479	6000	12000	13
V^0	6,3211	16,446	-3,6791	0,52047	-0,022682	0	1500	7000	18
V	19,368	3,1278	0,48996	0	0	0	5000	9000	19
V ⁺	10,337	10,244	-1,6380	0,23600	-0,010888	0	1500	7000	18
V	12,089	5,8599	0,071496	0	0	0	5000	9000	19
V ²⁺	11,292	10,439	-3,636	0,700	-0,066	0,002	2500	6000	20
V	22,373	0,42	0,034	0,02	-0,002	0,0001	6000	12000	20
W^0	0,39511	-0,25057	1,4433	-0,34373	0,041924	-0,0018402	1500	7000	18
VV	-3,9664	2,5768	0,14626	0	0	0	5000	9000	19
W ⁺	1,0550	1,0396	0,33030	-0,0084971	0,00055794	0	1500	7000	18
VV	2,1689	0,73458	0,31895	0	0	0	5000	9000	19
Xe ⁰	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
VE	1,5309	-0,12727	0,0075260	0	0	0	6945	12473	19

						Продо	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	прилож	0117171 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Xe⁺	4,0468	-0,050957	0,014823	-0,00052725	0	0	1500	7000	18
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3,7019	0,082439	-0,00086366	0	0	0	5250	12155	19
Y^0	4,8488	3,0826	-1,0879	0,19721	0,0096571	0	1500	7000	18
Y ⁺	-1,2752	6,2952	-1,0735	0,12900	-0,0058804	0	1500	7000	18
Yb ⁰	0,9763	0,0162	0,0052	-0,0053	0,0009139	0	1500	8000	21
10	0,664	0,301	-0,08529	0,005657	0,0007299	-0,00003599	2500	12000	13
Yb⁺	2,0043	-0,0182	0,0178	-0,0064	0,0007764	0	1500	8000	21
10	1,956	-0,0091	0,03433	-0,014098	0,0019723	-0,00006265	2500	12000	13
Yb ²⁺	1,465	-0,5828	0,28098	-0,065186	0,0072494	-0,00030769	2500	6000	13
10	1,461	-0,3013	0,0855	-0,01305	0,0009914	-0,00002413	6000	12000	13
Zn ⁰	1,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
211	2,4600	-0,37121	0,023875	0	0	0	6980	12536	19
Zn⁺	2,0000	0	0	0	0	0	1500	7000	18
211	2,1105	-0,025760	0,0015341	0	0	0	8500	12558	19
Zn ²⁺	1,0000	0	0	0	0	0	2500	12000	20
Zr ⁰	5,3459	4,5025	-0,016307	0,032396	0,0066393	-0,00057919	1500	7000	18
<u> </u>	115,23	-16,630	2,5937	0	0	0	6876	12348	19

Окончание приложения 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7r ⁺	4,0523	8,4092	0,015201	-0,0099477	0	0	1500	7000	18
<u> </u>	11,910	7,2385	0,00022446	0	0	0	7000	12570	19

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр
ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И АППАРАТУРА МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С	
АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ	4
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДА РАВНОВЕСНОГО	4
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И	
РАСЧЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ	11
3. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ	
ДОПУЩЕНИЯ	13
4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА	15
ПЛАЗМЫ	
4.1. Директивы к конкретному варианту расчета	15
4.2. Термодинамические свойства индивидуальных	40
веществ	16
4.3. Исходные данные, задающие элементарный состав термодинамической системы, и параметры,	
определяющие условия равновесия	17
5. РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ	19
	21
6. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 6.1. Влияние температуры плазмы на интенсивность	
спектральных линий	21
6.2. Изучение и прогнозирование матричных влияний	24
6.3. Снижение пределов обнаружения элементов	26
6.4. Выбор элемента внутреннего стандарта и его	
спектральной линии	28
6.4.1. Коррекция матричных влияний	28
6.4.2. Использование корреляционных коэф-	
фициентов	29
6.5. Аксиально наблюдаемая плазма	34
6.6 Показатель «жесткости» плазмы	38
Библиографический список	38 41
Приложение 1 Приложение 2	50
	J

Учебное издание

Пупышев Александр Алексеевич Данилова Дарья Анатольевна

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ МЕТОДА АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ

Учебное пособие

Научный редактор А.А. Пупышев Компьютерная верстка авторская

Подписано в печать X.XX.2005 Формат 60х84 1/16 Бумага типографская Офсетная печать Усл. печ. л.

Уч.-изд. л. XX,X Тираж 100 Заказ Цена «С»